# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

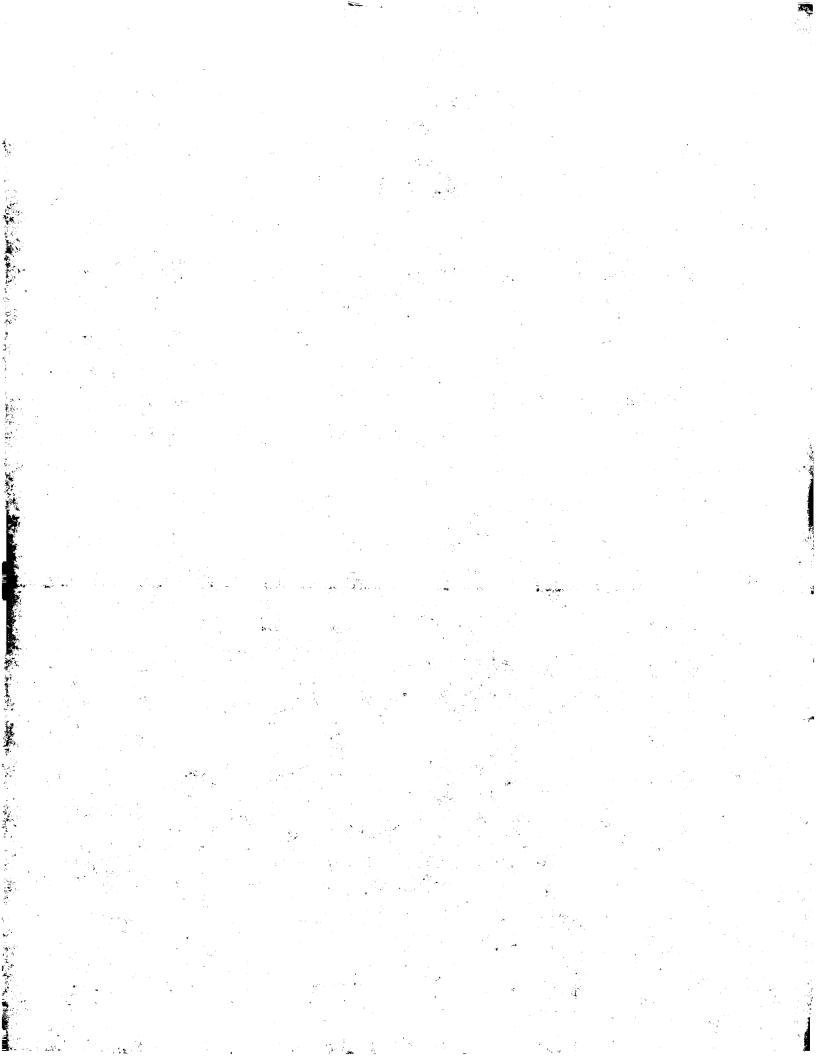
Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.





### **PCT**

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

### From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

IWAHASHI, Fumio Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-8501 JAPON



Date of mailing (day/month/year)

06 December 2001 (06.12.01)

Applicant's or agent's file reference

P22982-P0

EGFA 23225

#### **IMPORTANT NOTICE**

International application No.

PCT/JP00/03447

International filing date (day/month/year) 30 May 2000 (30.05.00)

Priority date (day/month/year)

Applicant

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. et al

1. Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this notice:

LIS

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

EP,JP

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

 Enclosed with this notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 06 December 2001 (06.12.01) under No. WO 01/93380

#### REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination (at present, all PCT Contracting States are bound by Chapter II).

### REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and the PCT Applicant's Guide, Volume II.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

J. Zahra

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Form PCT/IB/308 (April 2001)

Telephone No. (41-22) 338.91.11

4496929

THIS PAGE BLANK INSPRIG

特許協力条 ※



### 国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条) [PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 P22982-PO	今後の手続きについては、	国際調査報行及び下記5	告の送付通知様式(PCT <i>)</i> を参照すること。 	/ I S A / 2 2 0)	
国際出願番号 PCT/JP00/03447	国際出願日 (日.月.年) 06.06.	0 0	優先日 (日.月.年)		
出願人 (氏名又は名称) 松下電器商	<b>5業株式会社</b>		·		
国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。 この写しは国際事務局にも送付される。					
	この国際調査報告は、全部で4 ページである。				
□ この調査報告に引用された先行	f技術文献の写しも添付され 	ている。			
── ○ ~ の国際調本機関に提出	a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際田願かられたものに基っと自然が基といる。 「コースの国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。				
b. この国際出願は、ヌクレオ・ この国際出願に含まれる	・書面による配列を		•	&1101C°	
□この国際出願と共に提出	<ul><li>□ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表</li></ul>				
□出願後に、この国際調査	□ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表				
出願後に、この国際調査	E機関に提出されたフレキン - トス配列表が出願時におけ	ノルティヘク る国際出願の	開示の範囲を超える事項を	と含まない旨の陳述	
□ 出願後に、この国際調査機関に延出されたアレイレット 日本					
□ 書面による配列表に記載 書の提出があった。	<b>改した配列とフレキシブルデ</b>	イスクによる			
2. 請求の範囲の一部の調	査ができない (第1欄参照)	0			
3. 区 発明の単一性が欠如し	ている(第Ⅱ欄参照)。				
4. 発明の名称は	出願人が提出したものを承認	忍する。		•	
	次に示すように国際調査機関	関が作成した。		-	
				<u>'</u>	
5. 要約は 🗓	出願人が提出したものを承	認する。			
	第Ⅲ欄に示されているよう 国際調査機関が作成した。 の国際調査機関に意見を提	出願人は、こ	の国际嗣重報ロッ元という	2(b)) の規定により 3から1カ月以内にこ	
6. 要約書とともに公表される 第1 図とする。 X	図は、 出願人が示したとおりであ	る。	口なし	•	
	出願人は図を示さなかった				
	本図は発明の特徴を一層よ	く表している	•		

A SORBE BLANK HERE

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> H01S3/08, 3/036, 3/038				
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			
	SEARCHED			
	Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  Int.Cl <sup>7</sup> H01S3/03-3/038, 3/08-3/086			
Jits Koka	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched  Jitsuyo Shinan Koho 1940-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000  Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000			
JOIS * (	Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  JOIS [LASER*DEFORMATION * (EXPANSION + CONTRACTION ), LASER * TUBE DIAMETER  * (TURBULENT FLOW + VORTEX), LASER * AUXILLARY ELECTRODE (in Japanese)  WPI [H01S3/00*ALIGNMENT* (MIRROR+SUPPORT)]			
C. DOCUI	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.	
X Y	US, 3808553, A (Avco Corporation 30 April, 1974 (30.04.74), Figs. 5-13; column 9, line 22 to 3.04, 49-84191, A & GB, 14444	1 5-7		
	& FR, 2207371, A & DE, 23573 & IL, 43591, A & IT, 99760 & CA, 993698, A & CH, 58034 & SE, 395796, B			
<b>A</b>	JP 05-206544 A (Mitsubishi Electrical August, 1993 (13.08.93), Figs. 1,2; Claims 1,2; Par. Nos (Family: none)	1,6,7		
x	JP 63-227075 A (Matsushita Electric 21 September, 1988 (21.09.88), Fig. 1; Claim 1; page 2, lower	2		
Ÿ	to 20 (Family: none)	TOTO COTUMN, TIMES 0	5	
57				
Further	documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.		
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filing		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be		
date  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  considered novel or cannot be considered to involve step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invent considered to involve an inventive step when the document of particular relevance involve an inventive step when the document of particular relevance involve an inventive step when the document of particular relevance involve and inventive step when the document of particular relevance involve and inventive step when the document of particular relevance involve and invo			claimed invention cannot be to when the document is	
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family			skilled in the art	
Date of the actual completion of the international search 05 September, 2000 (05.09.00)  Date of mailing of the international search report 12 September, 2000 (12.09.00)				
	ailing address of the ISA/ nese Patent Office	Authorized officer		
Facsimile No.		Telephone No.		

### INTERNAT L SEARCH REPORT

		PC1/UP	00/03447
C (Continuat	ion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevan	at passages	Relevant to claim No.
X Y	Microfilm of the specification and drawings of the request of Japanese Utility Model Applic No. 106723/1990 (Laid-open No. 063667/1992) (NEC Corporation), 29 May, 1992 (29.05.92) Fig. 1, description, page 4, line 5 to page (Family: none)	ation 5, line 10	2 3-5
X Y A	JP 62-237781 A (Mitsubishi Electric Corporation 17 October, 1987 (17.10.87), Figs. 1, 4, 7; page 3, upper right column, 3 from the bottom to page 3, lower left column line from the bottom page 2, upper right column, lines 10 to 19; page 12, upper right column, lines 10 to 19; page 12, upper right column, lines 10 to 19; page 2, upper right column, lines 10 to 19.	ge 4, upper	2 3-5 8-12
Α	US 4823355 A (Amada Engineering & Service Co 18 April, 1989 (18.04.89), Figs. 1-2; Column 2, line 37 to Column 3, 1 & US, 4993037, A & JP, 63-302583, A		8-12
A	JP 02-129976 A (Toshiba Corporation), 18 May, 1990 (18.05.90), Fig. 1; page 2, lower right column, line 8 to page 1 column, line 14 (Family: none)	age 3, upper	8-12
X Y A	US 4287487 A (Hitachi Ltd.), 01 September, 1981 (01.09.81), Fig.1; Full text & JP, 55-004957, A & GB, 2027980, A & FR, 2430107, A & DE, 2926009, A		8,13,15 14 9-12
Y	JP 02-208984 A (AMADA Co., Ltd.), 20 August, 1990 (20.08.90), Fig. 1; page 2, lower left column, lines 3 (Family: none)	to 17	14
X Y	JP 01-103889 A (Hitachi, Ltd.), 20 April, 1989 (20.04.89), Fig. 4; page 1, lower left column, 2 <sup>nd</sup> line bottom to page 1, lower right column, line (Family: none)	from the 7	13,15 14
A	JP 60-161687 A (Osaka Transformer K.K.), 23 August, 1985 (23.08.85), Fig. 1; page 2, upper left column, 2 <sup>nd</sup> line bottom to page 2, lower left column, line (Family: none)	e from the 3	13-15
	time freezed shoot) (July 1997)		



Internation pplication No.
PC1'/JP00/03447

		Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation fitem 1 f first sheet)	
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:			
1. [		Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:	
2.		Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:	
3.		Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).	
Roy	TT	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)	
		rnational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:	
1.	the Bodin inn pro cer pro	The inventions of claims 1-7 relate to a laser oscillating device having first mirror holder, a second mirror holder, and mirror holder coupling obers coupling the first and second mirror holders.  The inventions of claims 8-12 relate to a laser oscillating device wherein a relationship between the inner diameter A of a laser tube and the width of a laser gas passage near the laser gas inlet of a discharge tube in the rection perpendicular to the gas flow and/or the relationship between the ner diameter A and the product CD of the height C of a circular columnar of objection provided in a position opposed to the laser gas inlet from the objection is defined.  The inventions of claims 13-15 relate to a laser oscillating device having auxiliary electrode disposed in a hole made in a discharge tube and connected either of the electrodes through a high-resistance resister.  As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.	
2.	ليا	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.	
<ol> <li>4.</li> </ol>		As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:  No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:	
Ren	nark	on Pr test  The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.  No protest accompanied the payment of additional search fees.	

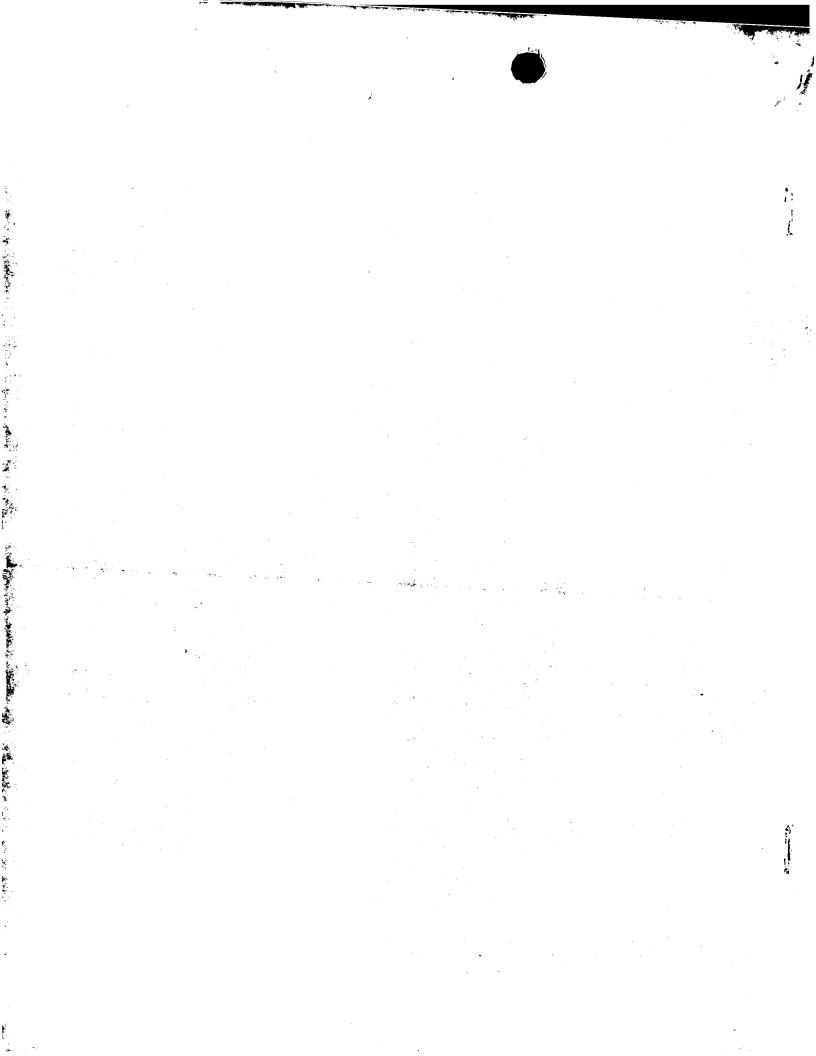




### 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/03447

第 I 欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第 1 ページの 2 の続き)
法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。
1. □ 請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
2. 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. □ 請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
請求の範囲1-7は、第1のミラーホルダと、第2のミラーホルダと、前記第1のミラーホルダと第2のミラーホルダ間を連結する複数のミラーホルダ連結部材を有するレーザ発振装置に関するものである。 請求の範囲8-12は、放電管のレーザガス入り口近傍のレーザガス流路のガス流方向に対して垂直方向の幅をB、前記放電管のレーザガス入り口対向部に放電管中心からの高さC、内径Dの円柱状の突起部を設け、前記放電管の内径をAとした時、AとB及び/又はAとCDとの関係を規定したレーザ発振装置に関するものである。 請求の範囲13-15は、放電管に穴を開け、前記穴部に補助電極を配置し、前記補助電極をどちらか一方の電極に高抵抗を介して接続したレーザ発振装置に関するものである。
1. 区 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4.   出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
追加調査手数料の異議の申立てに関する注意





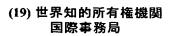
### 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/03447

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))					
· Int.	C1' H01S3/08, 3/036,	3/038			
B. 調査を	 行った分野				
	最小限資料(国際特許分類(IPC))				
Int.	$C1^7$ H01S3/03-3/038,	3/08-3/086			
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの				
日本国	<b>美用新案公報</b> 1940-1996				
	公開実用新案公報 1971-1996				
	登録実用新案公報 1994-2000 実用新案登録公報 1996-2000				
F 不 国 7		·			
JOIS	国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) JOIS [レーザ*変形* (膨張+収縮)、レーザ*管径* (乱流+渦)、レーザ*補助電極] WPI [H01S3/00*ALIGNMENT*(MIRROR+SUPPORT)]				
C. 関連する		1			
<u></u> 引用文献の	3 C PD の 24 N 3 X HV		関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号		
X Y	US, 3808553, A(Avco Cor 30. 4月. 1974(30. 04. Fig. 5-13、第9欄第22行-第10欄類 & JP, 49-84191, A & C & FR, 2207371, A & L & IL, 43591, A & C & CA, 993698, A & C & SE, 395796, B	74) 第26行 GB、1444404、A	1 5-7		
Α .	JP, 05-206544, A (三 13.8月.1993 (13.08. 図1、2、請求項1、2、段落13、1	菱電機株式会社) 93) 16、17(ファミリーなし)	1, 6, 7		
図 C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表された文献であってて出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願「&」同一パテントファミリー文献					
国際調査を完善	国際調査を完了した日 05.09.00 国際調査報告の発送日 12.09.00				
日本	の名称及びあて先 国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 部千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員) 小 原 博 生 電話番号 03-3581-1101	2K 8102 内線 3253		



C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	JP, 63-227075, A(松下電器産業株式会社) 21.9月.1988(21.09.88) 第1図、請求項1、第2頁左下欄第8-20行(ファミリーなし)	2 5
X Y	JP, 日本国実用新案登録出願02-106723号(日本国実用新案登録出願公開平04-063667号)の願書に添付された明細書及び図面のマイクロフィルム(日本電気株式会社)29.5月.1992(29.05.92)第1図,明細書第4頁第5行-第5頁第10行(ファミリーなし)	2 3-5
X Y .A	JP,62-237781,A(三菱電機株式会社) 17.10月.1987(17.10.87) 第1、4、7図、第3頁右上欄下から3行-同頁左下欄下から2行 第2頁右上欄第10-19行、第4頁左上欄第11-19行 (ファミリーなし)	2 3-5 8-12
<b>A</b> .	US, 4823355, A(Amada Engineering & Service Co. Inc) 18. 4月. 1989 (18. 04. 89). Fig. 1-2、第2欄第37行一第3欄第18行 &US, 4993037, A &JP, 63-302583, A	8−12
A	JP,02-129976,A(株式会社東芝) 18.5月.1990(18.05.90) 第1図、第2頁右下欄第8行-第3頁左上欄第14行 (ファミリーなし)	8-12
X Y A	US, 4287487, A(Hitachi Ltd.) 1.9月.1981 (01.09.81) Fig.1、全文 &JP, 55-004957, A &GB, 2027980, A &FR, 2430107, A &DE, 2926009, A	8 13 15 14 9-12
Y	JP, 02-208984, A (株式会社アマダ) 20.8月.1990 (20.08.90) 第1図、第2頁左下欄第3~17行 (ファミリーなし)	14
X Y	JP, 01-103889, A (株式会社日立製作所) 20. 4月. 1989 (20. 04. 89) 第4図、第1頁左下欄下から2行-同頁右下欄第7行 (ファミリーなし)	13、15 14
A	JP, 60-161687, A (大阪変圧器株式会社) 23.8月.1985 (23.08.85) 第1図、第2頁左上欄下から2行-同頁左下欄第3行 (ファミリーなし)	13-15





(43) 国際公開日 2001年12月6日(06.12.2001)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

ħ

WO 01/93380 A1

H01S 3/08, 3/036, 3/038

(HONGU, Hitoshi) [JP/JP]; 〒561-0854 大阪府豊中市 稲津町3-1-1 Osaka (JP).

(74) 代理人: 岩橋文雄, 外(IWAHASHI, Fumio et al.); 〒 571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/03447

(22) 国際出願日:

2000年5月30日(30.05.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電 器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-

大字門真1006番地 Osaka (JP).

日本語

TRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府門真市

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 林川洋 之 (HAYASHIKAWA, Hiroyuki) [JP/JP]. 本宮

(81) 指定国 (国内): JP, US.

業株式会社内 Osaka (JP).

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

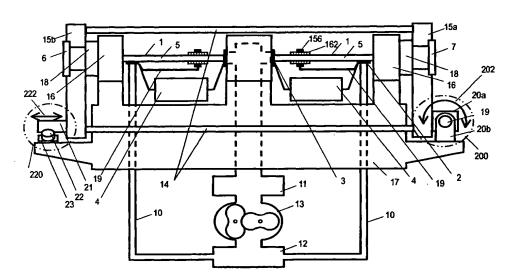
添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: LASER OSCILLATING DEVICE

(54) 発明の名称: レーザ発振装置



(57) Abstract: A support part (20a) supporting an OPM holder (15a) in such a way that the OPM holder (15a) may be perpendicular to the axis of the laser beam is disposed under the OPM holder (15a). A rotary shaft (19) is passed through the support part (20a) and a rotary shaft support part (20b), and thereby the OPM holder (15a) and a DT base (17) is combined. These constitute a rotation of the combined of the support unit (200). The rotation support unit (200) has a degree of freedom of rotation in the direction indicated by the arrow (202). A support bar (21) is attached under an RM holder (15b). A rotary body (22) and a rotary body support part (23) supporting the rotary body (22) is provided on the DT base (17) side to support the support bar (21). These constitute a slider structure (220) slidable along the optical axis. The slider structure (220) has a degree of freedom in the direction indicated by the arrow (222).



(57) 要約:

〇PMホルダ(15a)がレーザ光軸に対して垂直になるように支持するための支持部(20a)が、OPMホルダ(15a)の下部に配置されている。回転軸(19)は、上記の支持部(20a)と回転軸支持部(20b)に挿入することにより、OPMホルダ(15a)とDTベース(17)は、組み合せられる。これらによって、回転支持部(200)を構成している。この回転支持部(200)は、矢印(202)の回転方向に自由度を持つ。一方、RMホルダ(15b)の下部には、支持棒(21)が取付けられている。DTベース(17)側には、回転体(22)と前記回転体(22)を支持している回転体支持部(23)が、上記支持棒(21)を支持するために構成されている。これらによって、光軸方向に摺動自在なスライダー構造(220)が形成されている。このスライダー構造(220)は、矢印(222)の方向に自由度を持つ。

### 明細膏

#### レーザ発振装置

### 5 技術分野

本発明はレーザ発振装置、特に光軸方向に放電管を配置した軸流型ガスレーザ発振装置に関する。

### 背景技術

10 図25に軸流型と呼ばれるガスレーザ発振装置の概略構成の一例を示す。以下、図25を参照しながら軸流型ガスレーザ発振器(以降、単にAFGLOと記す)を説明する。

図25に示すように、AFGLOは、主にレーザ共振器と、電源部4と、 レーザガス循環部とから構成される。

15 上記レーザ共振器は、放電空間 5 を有する放電管 1 と、終段鏡(以降、単にRMと記す) 6 と、出力鏡(以降、単にOPMと記す) 7 とからなる。放電管(以降、単にDTと記す) 1 は、ガラスなどの誘電体により構成され、そのDT1の両端の近くに電極 2、3が設けられている。上記電極 2、3間に挟まれたDT1内に、放電空間(以降、単にDAと記す) 5 がある。複数のDA5を挟むように、RM6とOPM7が配置されている。上記RM6は、100%に近い反射率を有する反射鏡である。上記OPM7は部分反射鏡であり、レーザビーム8は、上記OPM7より出力される。

また、上記電源部 4 は、電極 2 、 3 に、上記 D A 5 で放電するために 25 接続している。

10

25

ものである。

また、レーザガス循環部(以降、単にLGCPと記す)は、送風機13と、熱交換機11、12と、レーザガス流路10と、上記複数のDT1のDA5とからなる。レーザガスは、AFGLOを構成する上記LGCPを、矢印9の方向に循環している。送風機13は、そのレーザガスを循環させるためのものである。この送風機13により、レーザガスの流速は、DA5にて約100m/sec程度である。また、上記LGCPの圧力は、100~200Torr程度の圧力である。上記電極2、3に、上記電源部4より所定の電圧が印加されると、上記DA5は放電する。その放電と送風機の運転により、レーザガスの温度は上昇する。熱交換機11および12は、温度上昇したレーザガスを冷却するための

以上が従来のAFGLOの構成であり、次にその動作について説明する。

送風機13より送り出されたレーザガスは、レーザガス流路10を通り、DT1内へ導入される。この状態で、上記電極2、3に、上記電源部4より所定の電圧が印加されると、上記DA5は放電する。DA5内のレーザガスは、この放電エネルギーを得て励起さる。その励起されたレーザガスは、RM6およびOPM7により形成されたレーザ共振器で共振状態となる。その結果、OPM7からレーザビーム8が出力される。この出力されたレーザビーム8は、レーザ加工等の用途に用いられる。以下、上記した従来のAFGLOの課題について記載する。

まず第1の課題について記述する。

図26は、従来のAFGLOの光学ベンチを含むレーザ共振器の概略 構成を示す。OPM7は出力ミラーホルダ150aによって、保持され ている。また、RM6は終段ミラーホルダ150bによって、保持され

25

ている。一方、DT1は放電管ホルダ(以降、単にDTホルダと記す)160を介し、光学ベンチである放電管ホルダベース(以降、単にDTベースと記す)170にて保持されている。DTベース170の両端は、それぞれのミラーホルダ150a、bと接続されている。ミラーホルダ150a、bとDTベース170は、組立てられて、一体構造となっている。DTホルダ160と各ミラーホルダ150a,bとは、摺動自在となるように両端をOリングなどで保持した接続管180でつながっている。

上記構成において、RM6の中心とOPM7の中心を結ぶ軸と、RM10 6とOPM7は、垂直になるように配置されている。すなわち、RM6とOPM7は、お互いに平行になるように配置されている。その平行度は、互いに数μm以下の精度になるように調整されている。また、RM6とOPM7の中心を結ぶ軸と、DT1の中心軸が一致するように、配置されている。

15 正常なレーザ出力を得る為には、

RM6とOPM7の平行度は10<sup>-6</sup>ラジアン以下、且つミラーの成す軸とDTの成す軸とは数10ミクロン以下の精度が必要となる。この精度を保つため、それぞれのミラーホルダとDTベースとは一体構造化した剛体を成している。

20 この様な従来のレーザ発振装置の持つ第1の課題について、以下に説明する。

上記LGCP内部の真空度は、100~200Torr程度である。 一方、その外側は大気(760Torr)である。LGCPの内部と外部には、圧力差による応力(以降、単に真空力と記す)がかかる。通常、上記のDTベース170の両端は、支持構造物(図示せず)で支持され ている。また、上記のLGCPも、支持構造物(図示せず)で支持されている。したがって、図25に示す中央部のDTホルダ160cには、 上気の圧力差により、下向きの応力が加わる。

この圧力差による応力により、DTベース170は、曲がることの無 5 い様に、鋼などの剛性の高い材料を用いている。また、剛性を維持する ために、DTベース170は、DT1などの部品と比較すると、かなり 大型な構造となっている。

しかし、剛性を上げるにしても、大きさに限界がある。したがって、上記真空力により、DTベース170は、数10μm程度、曲がることが有りうる。上記のように、DTベース170とミラーホルダ150a、150bは一体構造となっている。そのため、DTベース170が数10μm曲がっただけで、ミラーホルダ150aとミラーホルダ150bの平行度が変化する。この平行度の変化により、レーザ出力が下がることがある。

15 また、DTベース170は熱容量が大きいため、外気温が変化したときに、その温度変化に追随できない。外気温の変化により、DTベース170名部で温度差が発生することがある(例えば図26に示す、上部と下部の温度差、あるいは左側と右側の温度差)。温度差が生じると、熱膨張や熱収縮のため、DTベース170が曲がる。その結果、RM6とOPM7の平行度が保てなくなる。この平行度の変化により、レーザ出力が下がることがある。図27は、外気温度に対するレーザ出力の変化を模式的に示している。

この問題を解決する為の従来の取り組みとしては、以下のようなものがあげられる。

25 真空力によるDTベース170の曲がりにたいする対応策として、例

10

15

20

25

えば内部と外部の圧力差による応力がバランスできるように、圧力差による応力をキャンセルするキャンセラを取りつける試みがなされた。しかし、キャンセラの取付けにより、かえって予想外の応力が発生し、悪影響を及ぼす結果となることがあった。

一方温度差による膨張・収縮に対する対応策としては、DTベース170の温度を一定に制御する試みが成された。その試みは、DTベース170の中に液体(例えば、水)を流し、その液体の温度を一定に制御する事である。しかし、DTベース170の体積は、剛性をあげる為、大きい。したがって、DTベース170の熱容量が大きくなり、完全に温度差を解消する事は出来ていなかった。

また、従来のAFGLOは、下記のような第2の課題を有している。

DT1内でのレーザガスの流れは、DT1内にガスが流入されてから排出されるまで、可能な限りガス流れ方向に対して均一である事が望ましい。ガス流が均一であれば放電状態が安定する。その結果、DA5に注入された電気入力に対するレーザ出力の効率が高まる(レーザ発振効率という)。しかしAFGLOの構成上、DT1に対してレーザガス導入部を同軸に設けることは構成上複雑になる。実際には、図28のようにレーザガス導入部はDT1に対して略直角に配置されるケースが一般的である。また、図28と、図29は、DT1の内部のガスの流れを模式的に示している。図29は、図28における29-29での断面を示す図である。この構造により、図28中に示すように、DT1内の、特にレーザガス入り口137近傍において、ガス流中に渦巻き136が発生しやすい。この渦巻き状のガス流により、DT内のガス流が乱れる。この結果、レーザ発振効率を高めることができなかった。図30は、DA5への電気入力と、レーザ出力の関係を示している。

20

25

これに対して公知の例(特開平7-142787)として、ガスを一旦貯めておくチャンバーを設け、これをレーザガス導入部と接続する構成が提案されている。これはレーザガス導入部へ入るレーザガスの方向性を無くすことによって、DT内でのガス流の偏りを無くす事を目的としたものである。本発明の発明者らの検討によると、レーザ導入部からDT内へガスが入る際に、どうしてもガス流の偏りが発生し、各所に渦巻きが出来る。その結果、特開平7-142787に提案された構成では、レーザ発振効率をさらに高めることができなかった。

さらに、従来のAFGLOは、下記のような第3の課題を有している。
DT1の周辺に設けられた電極2、3間の電圧が、放電開始電圧に達すると放電が開始する。その放電開始の瞬間に、DT1に大きな突入電流が流れる。放電電流が流れはじめると、DTのインピーダンスは低下し、やがて20KV程度の維持電圧に落ち着く。このような状態になると電流値も安定し、均一な放電が得られる。しかし放電開始の瞬間の突入電流により、一時的に放電が乱れる。安定した放電になるまでに、時間を要する。この突入電流の値は、放電開始電圧に比例する。そのため、放電安定化のために、放電開始電圧を下げることが大きな課題である。

従来例としては図31に示すように、DT1内部の、電極2近傍に補助電極156を配置し、補助電極156と電極3側を、数MΩの高抵抗158で接続したものがあった。この場合、補助電極156と電極3との距離が大きすぎる為、補助電極156と電極2の間で、レーザガスを電離しても、電極3に到達する前に、ほとんどが再結合する。したがって、この構造では、放電開始電圧を低減するための大きな効果が、得られていない。

図32はもう一つの代表的な従来例である。DT1の外面に沿って、

10

20

25

電極2側から電極3側に向かって導体159を伸ばし、導体159の電 極3寄りの端部に補助電極156を取り付ける。この補助電極156は、 誘電体材料からなる絶縁シート162を介してDT1の外周面に取付ら れている。放電開始を下げるために、誘電体の厚みを薄くする検討も実 施したが、微少放電によりDT1 の壁面に経時的に穴があくという問題 があった。

上記のように従来のAFGLOでは、補助電極と呼ばれる機構を付加 する事が通常行われている。これは何らかの機構によりDT内の絶縁破 壊電圧を下げ、放電が点弧し易くする事で、放電開始時の突入電流を下 げるようとする試みである。この補助電極自体は発想として良い物であ るが、性能および信頼性の面で、満足のいく構成を持つものは、従来実 現できていなかった。

上記したように、従来のAFGLOは、

- 1) LGCPと大気圧である外部の圧力差により、共振器各 部に、応力が生じる。その応力により、DTベース170は、数 15 10μm程度、曲がることが有りうる。DTベース170と一対 のミラーホルダ 1 5 0 は一体構造となっている為、D T ベース 1 70が数 $10\mu$ m曲がっただけで、一対のミラーホルダ150aと150b相互の角度が変化する。このことにより、レーザ出力 の安定性をより高めることが困難であった。
  - DT内でのレーザガス流が、DTの中心部あるいは外周 部のどちらかに偏ってしまう傾向がある。そのため、均一なガス 流は実現出来ていない。したがって、エネルギー効率をより高め ることができなかった。
  - 3) 電極2、3間が放電開始電圧に達し放電が開始する瞬間

には、DTに大きな突入電流が流れる。この放電開始の瞬間の突入電流が流れたときは、大電流が流れる為一時的に放電が乱れる。このため、放電が落ち着くのに時間を要し、その間は放電が不安定(すなわち、レーザ出力が不安定)となる。この放電の過渡的な不安定を短縮することができていない。

の課題が有った。

### 発明の開示

5

15

25

本発明は上述のごとき問題を鑑みてなされたものである。

- 10 本発明のAFGLOは、上記第1の課題を解決するために、
  - a) エネルギーを与えて内部に配置したレーザ媒質を励起する D T と、
  - b) 前記 D T で励起されたレーザ媒質から放出されるレーザ光の 光軸上に配置した少なくとも一対のミラーと、
  - c) 前記ミラーをそれぞれ保持する少なくとも一対のミラーホル ダと、
  - d) 前記ミラーホルダ間を連結する複数のミラーホルダ連結棒と、
  - e) 前記DTを支持するDTホルダと、
  - f) 前記DTホルダを支持するDTベースと
- 20 を有し、
  - g) 前記一方のミラーホルダを前記 D T ベース に対してレーザ光 軸方向およびレーザ光軸と垂直方向に固定し、且つ
  - h) レーザ光軸方向を含む平面内においては回転方向に自由度を 持ち、
  - i) 前記他方のミラーホルダを前記DTベースに対してレーザ光

軸と垂直方向に固定し、レーザ光軸方向に摺動自在に、 構成している。

また、本発明のAFGLOは、上記第2の課題を解決するために、

- a) 内部にレーザガスを流すとともにレーザガスを励起させる D T と、
- b) 前記DTの両端近くに電極が設けられ、
- c) 前記電極の少なくとも一方が前記DTのレーザガス入り口近 傍に配置され、
- d) 前記DTにレーザガスを供給するレーザガス流路と、

### 10 を備え、

5

e) 前記DTのレーザガス入り口近傍の、前記レーザガス流路のガス流方向およびDT内のガス流方向に対して垂直方向の幅をBとし、前記DTの内径をAとした時、

1.1A < B < 1.7A

-15 に構成したレーザ発振装置である。

また、本発明のAFGLOは、上記第3の課題を解決するために、

- a) DTと、
- b) 前記DTの両端近くに設けられた電極と、
- c)前記電極間に高電圧を印加する高電圧電源と、
- 20 を備え、
  - d) 前記DTに穴を開け、
  - e) 前記穴部に補助電極を配置し、
  - f) 前記補助電極をどちらか一方の電極に高抵抗を介して接続する、
- 25 ように構成し、

- g) DTに設けられた穴の位置は、前記両電極間の距離をLとした時、補助電極と接続されていない側の電極より、0.4L ~ 0.7 Lの位置に設け、
- h) 高抵抗の抵抗値は、1 M Ω以上、1 0 0 M Ω以下である 5 レーザ発振装置である。

### 図面の簡単な説明

図1は、本発明の実施例1における軸流型ガスレーザ発振装置の概略構成図である。

10 図2は、図1に示すレーザ発振装置の共振器部の構成である。

図3Aは、図2に示す共振器部の左側面図である。

図3Bは、図2に示す共振器部の右側面図である。

図4は本実施例の他の構成を示すレーザ発振装置の、OPMホルダ とDTベース部との連結部分の三面図である。

15 図 5 A は本実施例のさらに他の構成例を示すレーザ発振装置の光学 ベンチの詳細図である。

図5Bは、図5Aに示す、ピローボール構成部近傍の部分各台断面 図である。

図6は、図5Aに示す6-6からRM6の方向を見た図である。

20 図 7 は本発明の実施例と従来例とでの、外気温変化に対するレーザ 出力の差を示したものである。

図8は、本発明の実施例2を示すレーザ発振装置の構成を示す図である。

図 9 は、本発明の実施例を示すレーザ発振装置の D T 内およびレー 25 ザガス流路内でのレーザガスの流れを示す模式図である。 図10は、図9に示す10-10の断面のレーザガスの流れを示す 模式図である。

図11はDTのレーザガス入り口近傍の幅 B と、レーザ出力との相関を示した図である。

5 図12は、DT内およびレーザガス流路内でのレーザガスの流れを 模式的に示している。

図13は、図12に示す13-13の断面のレーザガスの流れを示す模式図である。

図14はDTのレーザガス入り口対向部に設けられた円柱状の突起 10 部の、DTの中心からの高さCと、レーザ出力との相関を示した図であ る。

図15はDTのレーザガス入り口対向部に設けられた円柱状の突起 部の内径Dと、レーザ出力との相関を示した図である。

図16は、DT近傍およびDT内のレーザガスの流れを示す模式図 15 である。

図 1 7 は、図 1 6 に示す 1 6 - 1 6 の断面のレーザガスの流れを示す模式図である。

図18は、図11に示した幅Bと、レーザ出力の相関図に、図16 の構成をのレーザ出力を重ねて示したものである。

20 図19は本発明の実施例と従来例とでの、DTへの電気入力に対するレーザ出力の差を示したものである。

図20は、本発明の実施例3のレーザ発振装置である。

図21は、図20に示すレーザ発振装置におけるDT部の詳細な構成を示した模式図である。

25 図22は、本発明の実施例3の補助電極と接続されていない側の電

極と補助電極との距離と、放電開始電圧との関係を示した図である。

図23は、本発明の実施例3の補助電極と電極間を結合している高抵抗の抵抗値と、放電開始電圧およびレーザ出力との関係を示した図である。

5 図24は、本発明の実施例3と従来例とでのレーザ出力の差を示した図である。

図25は、従来の軸流型ガスレーザ発振装置の概略構成図である。

図26は、従来のレーザ発振装置の光学ベンチ部分の模式図である。

図27は、従来の軸流型ガスレーザ発振装置における出力安定性を10 示した図である。

図28は、従来のレーザ発振装置の構成におけるDT部の詳細およびレーザガスの流れを示した模式図である。

図29は、図28に示す29-29の断面のレーザガスの流れを示す模式図である。

15 図30は、従来例の電気入力とレーザ出力の関係を示した図である。

図31は、従来例におけるDT部の構成を示す模式図である。

図32は、従来例における他のDT部の構成を示す模式図である。

図33は、従来例の電気入力とレーザ出力の関係を示した図である。

### 20 発明を実施するための最良の形態

#### 実施の形態1

25

以下に本発明の実施の形態を図面によって説明する。図1は本発明の実施の形態1を示すレーザ発振装置である。図2は、図1に示すレーザ発振装置の共振器部の構成である。図3Aは、図2に示す共振器部の左側面図である。図3Bは、図2に示す共振器部の右側面図である。図2

5 に示した、従来のレーザ発振装置と、同じ機能を持つ構成部分については、同一の符号を記し、その説明を省略する。

以下、図1、図2、図3A、Bを用いて説明する。

OPMホルダ15aと、RMホルダ15bは、複数のミラーホルダ連 結棒(以降、単にMHCRと記す)14によって、互いに平行になるよ 5 うに支持されている。回転支持部200は、OPMホルダ15aをDT ベース17に支持するために構成されている。OPMホルダ15aがレ ーザ光軸に対して垂直になるように支持するための支持部20aが、O PMホルダ15aの下部に配置されている。DTベース17には、回転 10 軸支持部20bが、配置されている。上記の支持部20aと回転軸支持 部20bには、回転軸19を挿入するための穴が開いている。回転軸1 9は、上記の支持部20aと回転軸支持部20bに挿入することにより、 OPMホルダ15aとDTベース17は、組み合せられる。回転軸19 .と回転軸支持部20a、bとの接触部分は、回転をスムーズにするため、 摩擦が少なくなるようにスムーズな表面に仕上げている。もしくはボー 15 ルベアリング(ローラベアリングでもよい)などの回転に対して極めて 摩擦の少ない部品が挿入されている。上記のように、回転軸19、上記 支持部20aと回転軸支持部20bは、OPMホルダ15aをDTベー ス17に支持するために回転支持部200を構成している。この回転支 持部200は、図1および図2に示す矢印202の回転方向に自由度を 20 持つ。

一方、RMホルダ15bの下部には、支持棒21が取付けられている。 DTベース17側には、回転体22と前記回転体22を支持している回 転体支持部23が、上記支持棒21を支持するために構成されている。

これらによって、光軸方向に摺動自在なスライダー構造220が形成さ

10

15

20

25

れている。このスライダー構造220は、図1および図2に示す矢印3 02の光軸方向に自由度を持つ。

この構成によって、OPMホルダ15aとDTベース17は、レーザ 光軸方向と垂直方向に対して、固定される。しかし、OPMホルダ15 aとDTベース17は、レーザ光軸方向を含む平面内において、回転方 向にのみ自由度を持っている。これによって、OPM側のミラーホルダ 15aとDTベース17は、光軸のズレ無く結合することができる。

一方、終段側ミラーホルダ15bとDTベース17とは、レーザ光軸 方向と垂直方向に対して、固定される(ただし厳密には、上方向に対し ては、フリーである)。すなわち、ミラーホルダ15bの持つ重量(自重) により、終段側ミラーホルダ15bとDTベース17は、固定されたも のと考えられる。勿論、この構成は、光軸方向の摺動方向ならびに光軸 方向を含む平面内の回転方向に、フリーである。これによりRM側のミ ラーホルダとDT支持部も、OPM側と同様に光軸のズレ無く結合され る。

次にDTベース17が真空力や温度変化などにより変形した場合について考える。真空力により、DTベース17が曲がった場合、ミラーホルダとDT支持部の結合部分に、光軸方向を含む平面内における回転が発生する。しかし、前述したようにこの部分はOPM側、RM側共に回転方向に対してフリーである。このため、ミラーホルダに、真空力や熱応力による、平行度が変化するような力は掛からない。また、DT支持部が熱膨張もしくは熱収縮した場合、ミラーホルダとの結合部分には、光軸方向に直線方向の変位が発生するが、RMホルダはこの方向に対してフリーであるため、ミラーホルダに、真空力や熱応力による、平行度が変化するような力は掛からない。

本発明の構成の優れた点は、OPMホルダとDT支持部との結合部分にある。この方式は光軸方向を含む平面内における回転方向以外にも構造的に自由度をもっている。例えば、OPMホルダ15aとRMホルダ15bの下部毎に2ヶ所ずつピローボールなどの自由度の高いものを介して結合する構成も考えられる。しかし、この方式は、上記の自由度を、2点留めにより規制しようとする。このため、真空力による、平行度が変化するような力が生じやすくなる。ミラーホルダ自身の熱膨張・収縮により、固定を行っている2点間の距離が変化するため、そのための平行度が変化するような力も発生しやすい。

10 図4は本実施例の他の構成を示すレーザ発振装置の、OPMホルダと DT支持部との連結部分の詳細図である。回転軸19、支持部20aお よび回転軸支持部20bの組み合せ部分は、ガタの無い(隙間がない) ように構成されている。しかし、全く隙間が無ければ、摩擦のため、相 互の回転はスムーズに出来なくる。前述したように、回転軸19と支持 部20aおよび、回転軸支持部20bとの接触部分にボールベアリング を挿入することで、光軸方向に対して平行方向についてはほとんどガタ が無くなる。且つ、ミラーホルダ自身の自重で下に押し当てられるので、 放電管の中心軸とミラーの光軸と、ミラーとミラーの間の相対位置はほ とんど変わらず、安定している。しかし光軸に垂直な方向に関して、支 持部20aと回転軸支持部20bとの間に、スムーズな回転のため、隙 20 間が必要である。その隙間によるガタツキを防止するため、弾性力によ り、上部回転軸支持部20aが、下部回転軸支持部20bに、片側で押 し当たるような構造を採る。図4は、その構造の一例を示している。例 えば、バネ材24を回転軸を中心に対称に2個配置することにより、バ ネ材24の弾性力は、支持部20aに加わる。回転軸19に取付けられ 25

WO 01/93380 PCT/JP00/03447

16

たバネ押さえ25と上部回転軸部材20aとの間に、前記バネ材24を縮めた状態で挟み込む構成をとっている。またバネ押さえ25およびバネ材24が、回転方向の動きを阻害しないように、回転軸19とバネ押さえ25との連結部分には、ピロボール26などの回転体を挿入している。

5

10

15

20

ただしRMホルダ15bとDTベース17との連結に関しては、必ずしも上記実施例に挙げたように1点固定である必要が無い。RMホルダとDT支持部との固定に、ピロボールなどの自由度の高い連結部材を用いて、2点で固定してもよい。その場合、OPM側は本発明の実施例に示すように1点固定であれば、支障は無い。

図5は本実施例のさらに他の構成例を示すレーザ発振装置の光学ベンチの詳細図である。

図2に示す実施例と同様に、ミラーホルダ15aとbは、互いに複数のMHCR14によって結合されている。また、同様に、OPMホルダ15aは、回転支持部200により、DTベース17に支持されている。一方、RMホルダ15bの下部には、ピローボール26が水平方向に2点配置されている。終段側ミラーホルダ15bは、前記ピローボール26を介して、DTベース17と連結している。図6は、図5に示す6ー6からRM6の方向を見た図である。図6に示すように、DTホルダ16およびDTベース17と、MHCR14とを連結する、リブ27が4ケ所配置されている。リブ27は、MHCR14とを連結する、リブ27が4ケ所配置されている。リブ27は、MHCR14の中央付近に配置されている。リブ27とMHCR14は、垂直方向へは若干のすべりが生じうるように構成している。

このリブ 2 7 挿入による光学ベンチ安定化効果について、以下説明す 25 る。 D T ベース 1 7 が真空力や温度変化などにより変形した場合、特に

温度変化により伸縮した場合について考える。この時、ミラーホルダと DTベース17の結合部分には、光軸方向に直線方向の変位が発生する。 しかし、ピロボールは、ピロボールとピロボールの中を通っている軸と の間が滑るため、フリーに動くことができる。このため、RMホルダは 5 この方向に対してフリーである。したがって、このため、ミラーホルダ に、熱応力による、平行度が変化するような力は掛からない。ただし、 いくら構造的にフリーになるように摩擦を少なくしても、実際には摩擦 力が0になる訳ではない。終段側ミラーホルダ15bとDTベース17 との連結部は、終段側ミラーホルダ15bの自重により重力方向(すわ 10 わち、図5の下方向)に押し付けられる。このため、厳密には、その部 分に摩擦力が発生する。そのためMHCR14に対しても、光軸方向に 引っ張りもしくは圧縮の力が働く。MHCR14は構造的に直径50m m程度、長さ1000~2000mm程度の円柱である。光軸方向(す なわち、MHCR14の長手方向)に引っ張りもしくは圧縮の力が働く と、MHCR14は、たわむ。この時、リブ27が配置されていない場 15 一合、各MHCR14はそれぞれ好き勝手な方向へ曲がる。結果として、 OPMホルダ15aとRMホルダ15bの平行度が崩れてしまう。

4本のM.H C R 1 4 と、D T ホルダ 1 6 およびD T ベース 1 7 を連結 するリブ 2 7 が配置されていると、M H C R 1 4 の剛性が向上し、摩擦 カによっても曲がることはすくない。したがって、ミラーホルダ同士の 平行度は保たれる。

さらに、MHCR14が、全て中心方向あるいは全て外側方向に撓むようにすれば、OPMホルダ15aとRMホルダ15bとの平行度はより正確に保つことができる。

25 例えば、前記リブ27により、4本のMHCR14をそれぞれ、MH

15

CR14同士が成す中心方向へ数mm程度、引き寄せた状態にする。ミラーホルダ連結材は、リブ27によって中心方向へ数mm程度引き寄せられることで、ごくわずかに湾曲した状態になっている。この状態から、MHCR14に引っ張りまたは圧縮の力が加わったとしても、4本のMHCR14は全て中心方向に撓む。このため、結果的にOPMホルダ15aとRMホルダ15bとの平行度は保たれる。

逆に、前記リブ27によって4本のMHCR14を互いに反対方向へ 湾曲させることでも、同様の効果が得られる。

上記のように、本発明の実施例においては、光学ベンチは非常に安定 10 し、ミラー同士の平行度を保つこと効果が極めて大きい。これによって 常に安定したレーザ発振を行うとが出来、大幅なレーザ出力安定化を実 現できる。

図7は本発明の実施例と従来例とでの、外気温変化に対するレーザ出力の差を示したものである。横軸に外気温、縦軸にレーザ出力を表している。本発明の実施例および従来例ともに、外気温20℃にて、ミラーが平行になるように調整したものである。その状態から、外気温が低下、あるいは上昇した場合のレーザ出力変化を示している。図7に示すように、従来例に比べ本発明の実施例においては、外気温変化に対して大幅なレーザ出力安定化が実現出来ている。真空力などの外力に対しても、同様の効果が得られる

20 同様の効果が得られる。

本発明により、真空力などの外力および外気温変化に対する光学ベンチの安定性、すなわちミラー平行度の安定化を実現出来、常に安定したレーザ出力を得られるレーザ発振装置を提供することが出来る。

上記の、ミラーホルダ連結棒の連結棒は、パイプで構成してもよい。 25 また、その連結棒または、パイプは、熱膨張係数の小さいものを使用す ると、温度差による膨張の差が少なくて、本発明のような共振器には、 有効である。

### 実施の形態 2

10

5 以下に本発明の実施の形態を図面によって説明する。

図8は、本発明の実施例2を示すレーザ発振装置の構成を示す図である。図9は、本発明の実施例を示すレーザ発振装置のDT内およびレーザガス流路内でのレーザガスの流れを示す模式図である。図10は、図9に示す10-10の断面のレーザガスの流れを示す模式図である。DT1のレーザガス入り口近傍37の、ガスの流れる方向およびDT内のガス流方向に対して垂直方向の幅をBとする。また、DT内径をAとする。図9は、AとBの関係が、

### 1.1A < B < 1.7A

となるような構成を採った時の、DT内およびレーザガス流路内でのレーザガスの流れを示している。図9において、幅Bのレーザガス流路を矢印9b方向に流れてきたレーザガスは、DTの入り口近傍の幅Bの部分に導入される。この部分から、レーザガスの流れは、DTの内径Aに狭められる。その後、流れ方向が矢印9a方向にDT内を流れる。この時レーザガスは、DT1の入り口近傍の広がった部分(すなわち、幅B)から緩い勾配をもって、DT1の下流側へ流される。このため、ガスの流れは、DT1入り口部分37から、下流側へと、なだらかな流線が形成される(すなわち、渦流は、発生しない)。DT1内でのレーザガス流の分布は、ほぼ全体的に均一に形成される。この時、幅Bが1.1Aより小さい場合(すなわち従来構成の場合)、DT入り口部分に渦流が、発生する。また、幅Bが1.7Aより大きい場合も、DT入り口部分に渦

WO 01/93380 PCT/JP00/03447

20

流が、発生する。その渦流により、DT内のレーザガス流分布は乱れる。図11はDTのレーザガス入り口近傍の幅Bと、レーザ出力との相関を示した図である。レーザガス入り口近傍の幅Bが、

1. 1A < B < 1.7A

5 の範囲で、レーザ出力が最大となっている事が判る。この範囲で、放電 が安定することによって、レーザ出力が最大となる。

図12は、他のDTの形状を示している。DTのレーザガス入り口の対向部に、DTの中心からの高さC、内径Dの円柱状の突起部を設けている。前記DTの内径をAとした時、

10 0. 5 A < C < 0.9 A

15

20

25

0.7A < D < 0.9A

となるように構成している。また、図12は、DT内およびレーザガス流路内でのレーザガスの流れを模式的に示している。図13は、図12に示す13-13の断面のレーザガスの流れを示す模式図である。レーザガス流路を矢印9b方向に流れてきたレーザガスは、DTのレーザガス入り口から導入される。その後、DTのレーザガス入り口対向部に設けられた円柱状の突起部部分へ当たる。そのレーザガスは、さらに、下流側へ流される。このため、DT入り口部分から、下流側へと、なだらかな流線が形成される。この結果、DT内でのレーザガス流分布はほぼ全体的に均一に形成される。

一方、円柱状の突起部が大きすぎると、DT上部に渦流が出来、これがDT内の流線を乱してしまう。このようにDTの各部で渦流が生じると、DT内のレーザガス流分布は極めて偏ったものとる。その結果、放電が乱れ、安定したレーザ発振が出来無くなる。図14はDTのレーザガス入り口対向部に設けられた円柱状の突起部の、DTの中

心からの高さCと、レーザ出力との相関を示した図である。

図14に示すように、高さCが、

0.5A < C < 0.9A

の範囲で、レーザ出力が最大となっている。この範囲で、放電が安定することによって、レーザ出力が最大となる。

図15はDTのレーザガス入り口対向部に設けられた円柱状の突起部の内径Dと、レーザ出力との相関を示した図である。

図15に示すように、内径Dが、

0.7A < D < 0.9A

10 の範囲で、レーザ出力が最大となっている。この範囲で、放電が安定することによって、レーザ出力が最大となる。

また、DTのレーザガス入り口近傍には電極が設けられている。このため、対向部の円柱状の突起部は金属などの導体で構成されている場合は、電界が乱され、放電が乱れやすい。したがって、対向部は、DTと同様に誘電体材料で構成されなければならない。具体的には、DTと同じパイレックス、石英など、もしくはセラミックなどの誘電体材料が望ましい。

図16は、DT近傍およびDT内のレーザガスの流れを示す模式図である。図17は、図16に示す16-16の断面のレーザガスの流れを 20 示す模式図である。

前記DTのレーザガス入り口37近傍の、ガス流方向に対して垂直方向の幅をBとする。前記DTのレーザガス入り口対向部に、DTの中心からの高さCとし、内径Dの円柱状の突起部38を設ける。

前記DT1の内径をAとした時、

0.5A < C < 0.9A

0.7A < D < 0.9A

の関係が成り立つように構成されている。また、前記DTのレーザガス 入り口対向部に設けられた、円柱状の突起部38は、セラミックなどの 誘電体より成っている。

以下DT内のレーザガスの流れる方向を9a、レーザガス流路内のレーザガスの流れる方向を9bとする。

図16は、図9と図12これらをまとめた構成である。本構成は、図9と図12の相乗効果により、一層の放電の安定化が実現でき、効果的である。図18は、図11に示した幅Bと、レーザ出力の相関図に、図16の構成をのレーザ出力を重ねて示したものである。

図19は本発明の実施例と従来例とでの、DTへの電気入力に対する レーザ出力の差を示したものである。横軸に放電電気入力、縦軸左にレ ーザ出力を表している。図19に示すように、本発明の実施例において は、レーザガス流改善効果により、従来例に比べ大幅なレーザ出力の増 大が実現出来ている。

本発明により、DT内のレーザガス流を均一化することで、大幅なレーザ発振効率の向上およびレーザ出力の増大を実現できるレーザ発振装置を提供することが出来る。

20

#### 実施の形態3

以下に本発明の実施の形態を図面によって説明する。図20は、本発明の実施例3のレーザ発振装置である。図21は、図20に示すレーザ発振装置におけるDT部の詳細な構成を示した模式図である。

25 100~200 Torr程度に減圧されたDT1の壁面に、穴55を

開けている。その穴をふさぐ形で、銅やタングステンなどの導体からなる補助電極 5 6 が取付けられている。補助電極 5 6 と D T 1 との接合部近辺は、O リングなどの真空パッキン 5 7 で封止されている。補助電極 5 6 が直接 D T 1 内のレーザガスに触れる事ができるようになっている。補助電極 5 6 は数 M Ω の高抵抗 5 8 を介し、電極 3 に接続されている。電極 2 と電極 3 は電源 4 に接続されている。

次にこの動作について説明する。補助電極 5 6 は電極 3 と高抵抗 5 8 を介し接続されている。このため、D T 1 内に電流が流れていない間は、電極 3 と補助電極 5 6 は同電位である。

高電圧電源4によって、電極2、電極3間の電圧を徐々に上昇させる 10 と、同時に電極2、補助電極56間の電圧も上昇していく。補助電極5 6がない場合は、電極2と電極3の放電開始電圧は約40KVに達する。 しかし、補助電極56は電極2に近い位置にあるため、電極2と補助電 極56の放電開始電圧は約23~24KV程度である。すなわち電極2、 15 電極3間の電位差が、23~24kv程度に達した時、同じ電位差とな った電極2と補助電極56間にて、放電が開始する。この放電路(放電 、 空間 5 )にあるレーザガスは電離される。電離したレーザガスはレーザ ガスの流れる方向9に示すように、電極3側へ流れる。この電離したレ ーザガスにより、DT1内のインピーダンスが低下し、電極2と電極3 20 との間のDA5に放電が開始する。一方、電極2と補助電極56との間 での放電電流は、補助電極56と電極3との間に設けられた数MQの高 抵抗58によって抑制される。このため、放電開始後は、ほとんど補助 電極56~電極3間に電流が流れる事は無い。

以上の動作によって、放電開始電圧を従来の40KVから23〜24K 25 Vまで低減できる。 WO 01/93380 PCT/JP00/03447

24

これによって放電開始の瞬間の突入電流を抑制でき、安定した放電を 実現できる。

前述のように、図31に示す従来例では、DT1内部の、電極2近傍に補助電極156を配置し、補助電極156と電極3側を、数MΩの高抵抗で接続したものがあった。この場合、補助電極と陰極側との距離が大きすぎる為、せっかくレーザガスを電離しても、陰極に到達する前に、ほとんどが再結合してしまい、大きな効果が得られていない。

5

10

15

20

25

これに対し本発明では、前記両電極間の距離をしとした時、補助電極と接続されていない側の電極より、0.4 L ~ 0.7 L の位置に補助電極を設けている。図22は補助電極と接続されていない側の電極と補助電極との距離と、放電開始電圧との関係を示した図である。この図に示すように、補助電極取り付け位置が0.4 L より小さい場合は、電離したレーザガスの再結合により、放電開始電圧を低減する効果は得られない。一方、0.7 L より大きいと、陽極と補助電極との距離が大きすぎるため、放電開始電圧が上がってしまう。これより、補助電極と接続されていない側の電極と補助電極との距離は、0.4 L ~ 0.7 L が最適である事が判る。

図32はもう一つの代表的な従来例である。DT外面に沿って、電極2側から電極3側へ導体159を伸ばしている。この導体159の電極3寄りの端部に補助電極156を取り付ける。また、この補助電極156を、誘電体材料からなる絶縁シート162を介して、DT1壁面に接合させている。補助電極156と電極3間とは、誘電体を介した容量結合である。この構成は、電流の通り道にあるレーザガスを電離し、放電開始電圧を下げるという試みであった。放電開始電圧を低減する効果を上げる為に、誘電体の厚みを薄くすることも試みたが、コロナ放電によ

りDTの壁面に経時的に穴があくという問題があった。本発明は、放電開始の際の微少電流の通過用に、DT1の補助電極 5 6 取り付け部に穴 5 5 を開けているため、経時的に穴が開くような問題は無く、長期的な信頼性にも優れている。

5 図23は、補助電極56と電極間を結合している高抵抗の抵抗値と、 放電開始電圧およびレーザ出力との関係を示したものでる。高抵抗58 の抵抗値が1MΩ未満の場合、補助電極部に電流が流れすぎ、DA5の 放電が乱される。その結果、高いレーザ出力が得られない。一方、抵抗 値が100MΩより大きい場合、補助電極の効果が小さく、放電開始電 10 圧を低減する効果が得られない。また、突入電流の為に放電が乱れ、レ ーザ出力が上昇する効果が得られない。したがって、高抵抗の抵抗値は、 1MΩ以上、100MΩ以下が適切である。

以上のように従来例では、性能面および信頼性の面で問題のあった補助電極であるが、本発明によって放電開始電圧の大幅な低減によるレー ザ出力の安定化が図れ、且つ長期に渡る信頼性も確保できる。

図24は本発明の実施例と従来例との、DTへの電気入力に対する放電開始電圧およびレーザ出力を示したものであり、横軸に放電電気入力、縦軸にレーザ出力を表している。本図に示すように、DTへの電気入力が大きくなればなる程、本発明の実施例における効果は顕著に表れてきている。放電開始電圧低減による放電安定化により、従来例に比べ大幅なレーザ出力の増大が実現出来ていることがわかる。

本発明により、放電開始電圧の大幅な低減による放電の安定化が図れ、 大幅なレーザ出力の増大を実現できるレーザ発振装置を提供することが 出来る。

15

### 産業上の利用可能性

本発明により、真空力などの外力および外気温変化に対する光学ベンチの安定性、すなわちミラー平行度の安定化を実現出来、常に安定したレーザ出力を得られるレーザ発振装置を提供することが出来る。

5 また、本発明により、DT内のレーザガス流を均一化することで、大幅なレーザ発振効率の向上およびレーザ出力の増大を実現できるレーザ 発振装置を提供することが出来る。

また、本発明により、放電開始電圧の大幅な低減による放電の安定化が図れ、大幅なレーザ出力の増大を実現できるレーザ発振装置を提供す10 ることが出来る。

#### 請求の範囲

- 1. レーザ発振装置であって、
  - a. エネルギーを与えて内部に配置したレーザ媒質を励起する放電管と、
  - b.前記放電管で励起されたレーザ媒質から放出されるレーザ光の光軸上に配置した第 1 のミラーと、第 2 のミラーと、
  - c. 前記第 1 のミラーと、第 2 のミラーをそれぞれ保持する 第 1 のミラーホルダと、第 2 のミラーホルダと、
  - d. 前記第 1 のミラーホルダと第 2 のミラーホルダ間を連結 する複数のミラーホルダ連結部材と、
  - e. 前記放電管を支持する放電管支持部と、
  - f. 前記第 1 のミラーホルダを放電管支持部に対してレーザ 光軸方向およびレーザ光軸と垂直方向に固定し、且つレー ザ光軸方向を含む平面内においては回転方向に自由度を 持つ第 1 の固定部と、
  - g. 前記第2のミラーホルダを放電管支持部に対してレーザ 光軸と垂直方向に固定し、レーザ光軸方向に摺動自在な第 2の固定部と、

を有するレーザ発振装置。

- 2. レーザ発振装置であって、
  - a. エネルギーを与えて内部に配置したレーザ媒質を励起する放電管と、

10

5

**15** 

20

10

- b. 前記放電管で励起されたレーザ媒質から放出されるレーザ光の光軸上に配置した第 1 のミラーと、第 2 のミラーと、
- c. 前記第 1 のミラーと、第 2 のミラーをそれぞれ保持する 第 1 のミラーホルダと、第 2 のミラーホルダと、
- d. 前記第 1 のミラーホルダと第 2 のミラーホルダ間を連結 する複数のミラーホルダ連結部材と、
- e. 前記放電管を支持する放電管支持部と、
- f. 前記複数のミラーホルダ連結部材を、ミラーホルダ以外の 部分で、相互に連結する、もしくは放電管支持部と連結す るリブと、

を備えたレーザ発振装置。

- 3. 請求項2記載のレーザ発振装置であって、前記リブは、複数のミラ 15 一ホルダ連結部材を互いに求心する方向に付勢する構成としたレーザ発 振装置。
- 4. 請求項 2 記載のレーザ発振装置であって、前記リブは、前記複数のミラーホルダ連結部材を互いに反対方向に付勢する構成としたレーザ発 20 振装置。
  - 5. 請求項1記載のレーザ発振装置であって、前記複数のミラーホルダ連結部材を、ミラーホルダ以外の部分で、相互に連結する、もしくは放電管支持部と連結するリブを備えたレーザ発振装置。

- 6. 請求項1記載のレーザ発振装置であって、前記第1の固定部は、レーザ光軸に対して軸が垂直になるように配置された回転軸部材と、回転軸部材の軸に対して垂直平面内の回転方向の自由度を保ったまま、ミラーホルダと放電管ベースとからそれぞれ回転軸部材を支持する回転軸支持部とからなるレーザ発振装置。
- 7. 請求項1記載のレーザ発振装置であって、前記固定具の回転軸方向に、弾性力をかけるレーザ発振装置。
- 10 8. レーザ発振装置であって、
  - a. 内部にレーザガスを流すとともにレーザガスを励起させる放電管と、
  - b. 前記放電管にレーザガスを供給するレーザガス流路 を備え、
  - c. 前記放電管のレーザガス入り口近傍の、前記レーザガス 流路のガス流方向に対して垂直方向の幅を B、前記放電管 の内径を A とした時、

1. 1A < B < 1.7A

とするレーザ発振装置。

20

15

- 9. レーザ発振装置であって、
  - a. 内部にレーザガスを流すとともにレーザガスを励起させる放電管と、
  - b. 前記放電管にレーザガスを供給するレーザガス流路
- 25 を備え、

10

15

20

c. 前記放電管のレーザガス入り口対向部に、放電管中心からの高さ C、内径 Dの円柱状の突起部を設け、前記放電管の内径を A とした時、

0.5A < C < 0.9A

0.7A < D < 0.9A

とするレーザ発振装置。

- 10. レーザ発振装置であって、
  - a. 内部にレーザガスを流すとともにレーザガスを励起させる放電管と、
- b. 前記放電管にレーザガスを供給するレーザガス流路 を備え、
  - c. 前記放電管のレーザガス入り口近傍の、前記レーザガス 流路のガス流方向に対して垂直方向の幅を B、前記放電管 のレーザガス入り口対向部に、放電管中心からの高さ C、 内径 D の円柱状の突起部を設け、前記放電管の内径を A と した時、

1.1A < B < 1.7A

0.5A < C < 0.9A

0.7A < D < 0.9A

とするレーザ発振装置。

11.請求項9記載のレーザ発振装置であって、前記放電管のレーザガス入り口対向部に設けられた、放電管中心からの高さC、内径Dの円柱 25 状の突起部は、誘電体より成るレーザ発振装置。 12. 請求項10記載のレーザ発振装置であって、前記放電管のレーザガス入り口対向部に設けられた、放電管中心からの高さC、内径Dの円柱状の突起部は、誘電体より成るレーザ発振装置。

5

- 13. レーザ発振装置であって、
  - a. レーザガスを満たした放電管と、
  - b. 前記放電管の両端に設けられた電極と、
  - c. 前記電極間に高電圧を印加する高電圧電源と、
- 10 を備え、
- d. 前記放電管に穴を開け、前記穴部に補助電極を配置し、 前記補助電極をどちらか一方の電極に高抵抗を介して接 続した

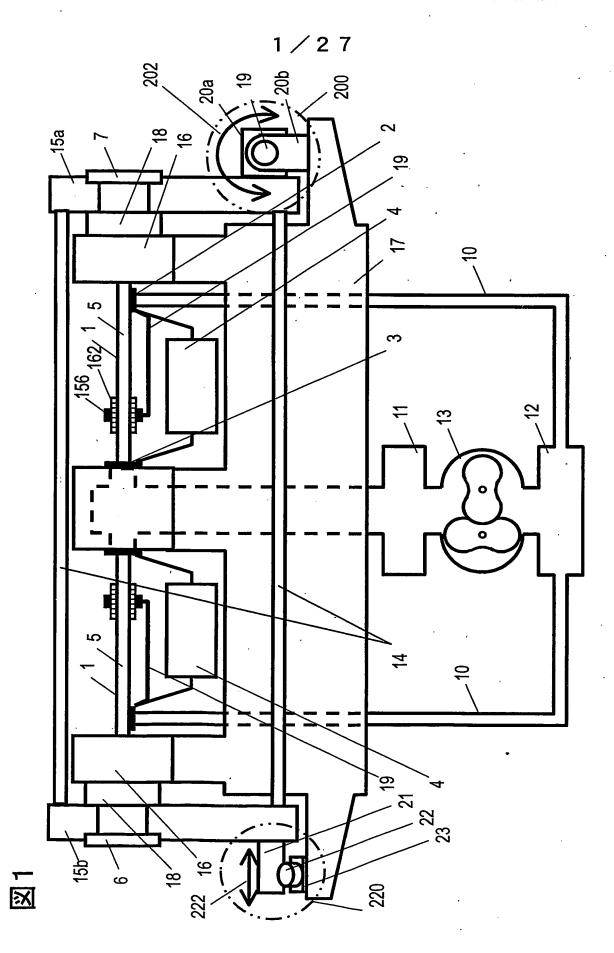
レーザ発振装置。

15

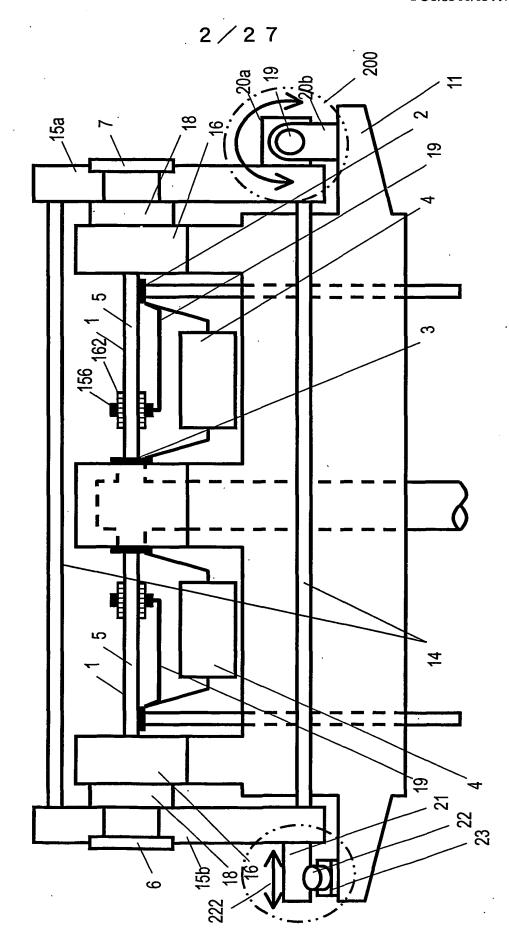
14.請求項13記載のレーザ発振装置であって、前記放電管に設けられた穴の位置は、前記両電極間の距離をLとした時、補助電極と接続されていない側の電極より、0.4L~0.7Lの位置に設けたレーザ発振装置。

20

15. 請求項13記載のレーザ発振装置であって、前記高抵抗の抵抗値は、1MΩ以上、100MΩ以下であるレーザ発振装置。

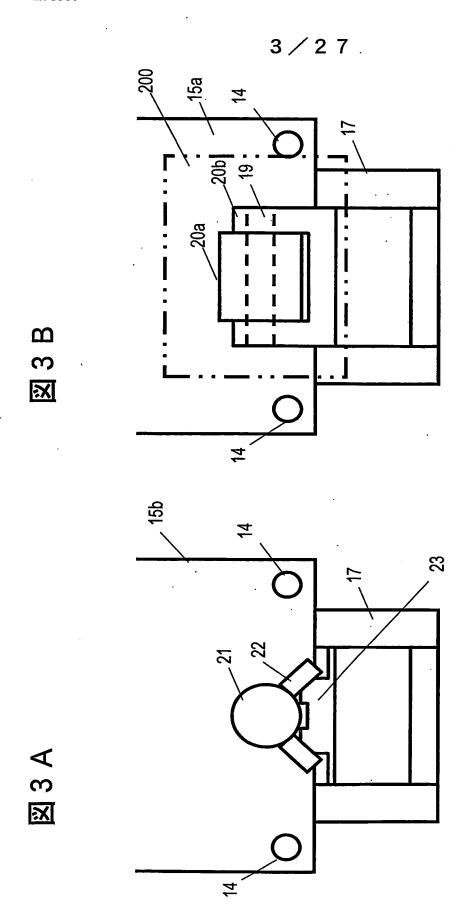


				·	
			*		
					•
					•
		•			
	•				
		•			
,					
•					
					•
					•



<u>図</u>

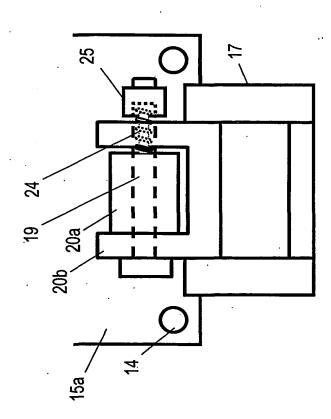
			•
			•
	•		
	: •		
·			
			•

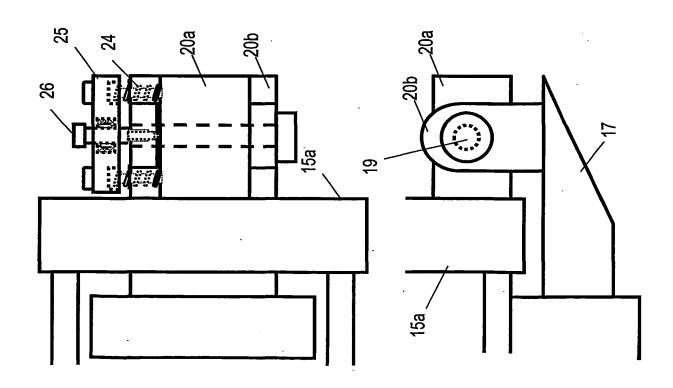


				-
		·		
				•
				•

# 4/27

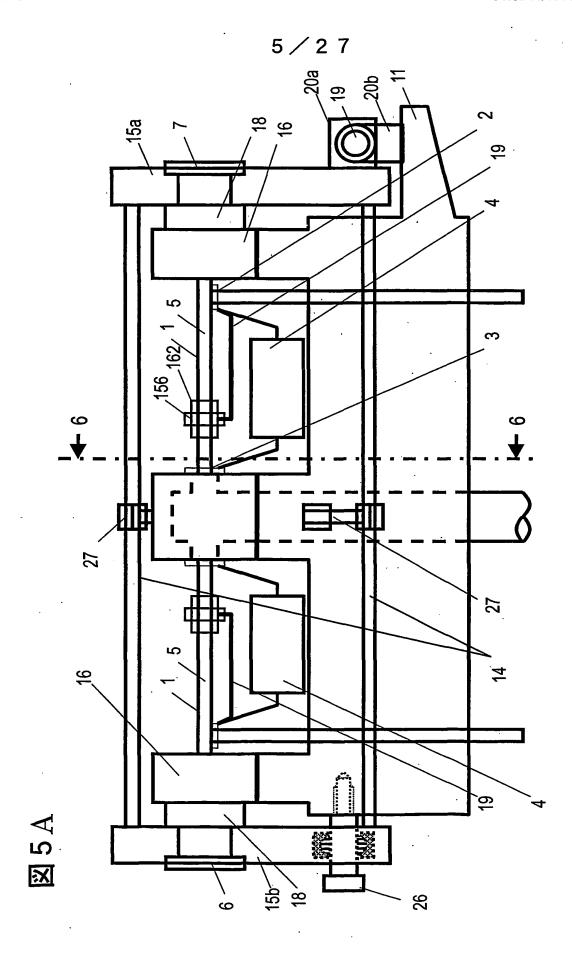






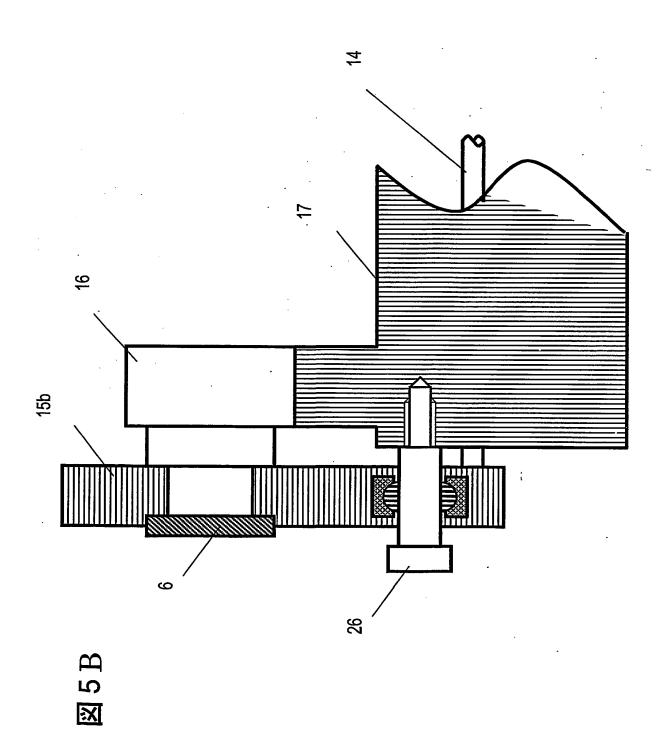
			<del></del>
			•
			•.
		•	
			•
			•

WO 01/93380 PCT/JP00/03447



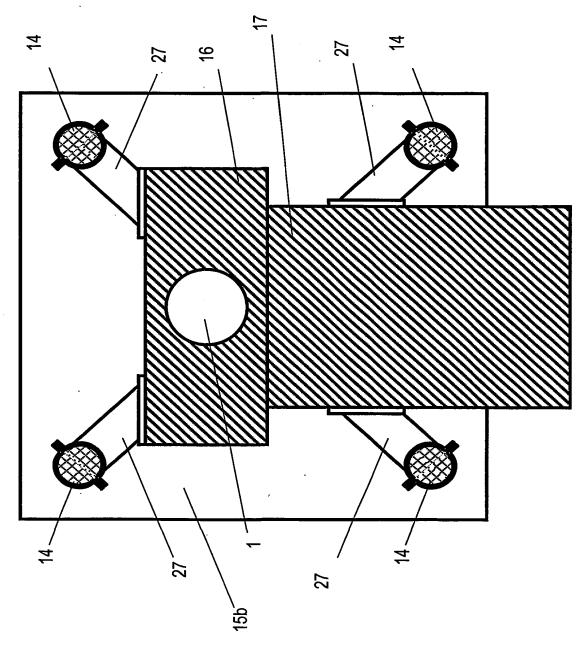
			•
			•
		,	
			•
		*	

6/27



	•		
		•	

## 7/27

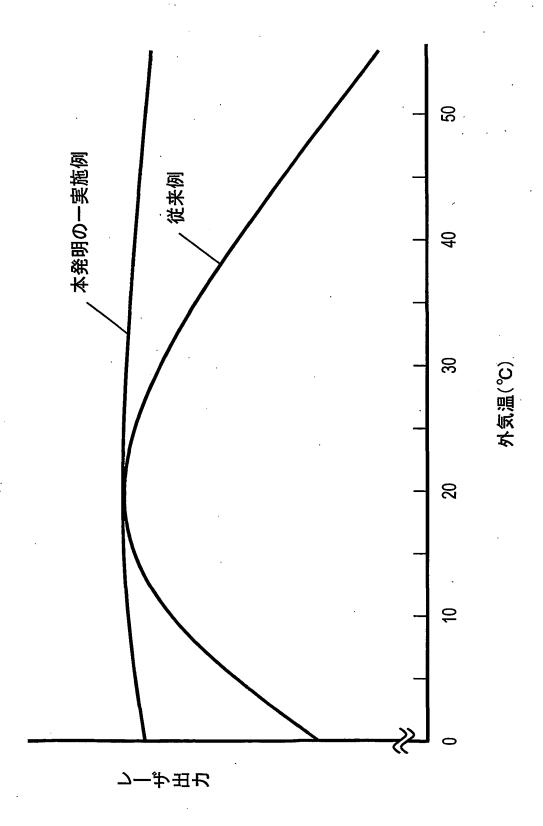


<u>図</u>

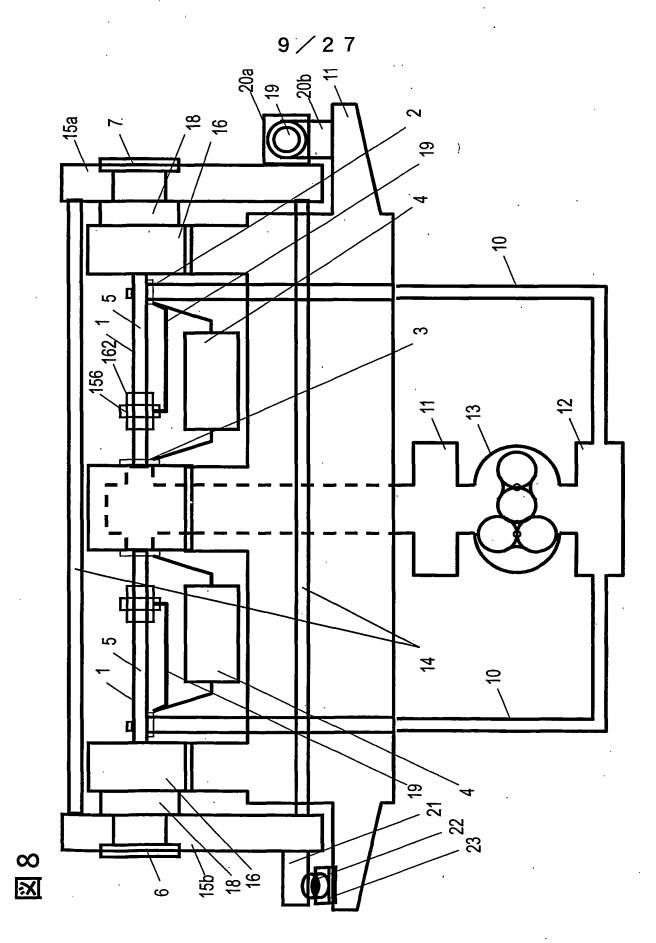


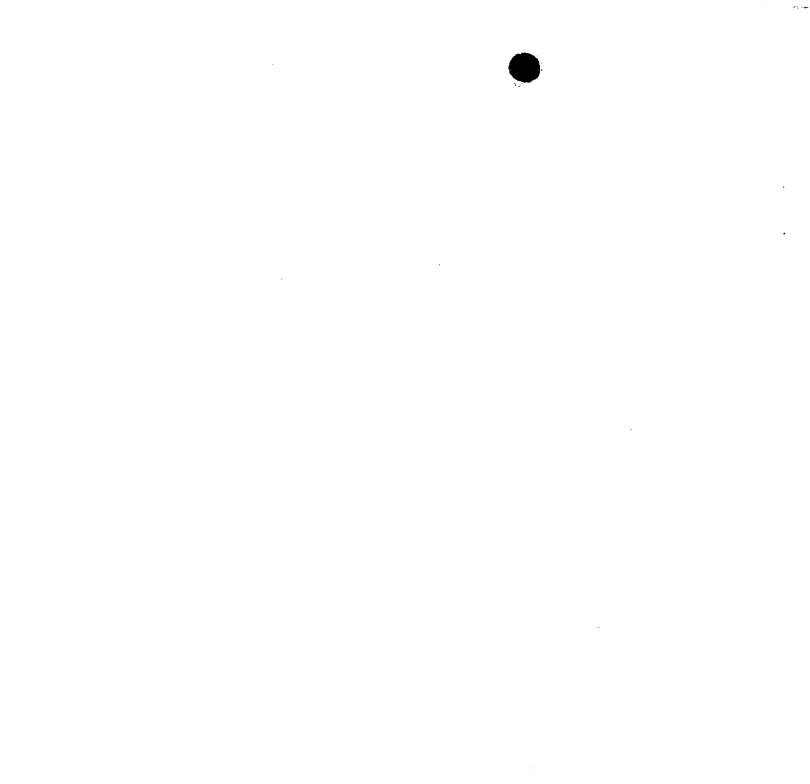
<u>図</u>

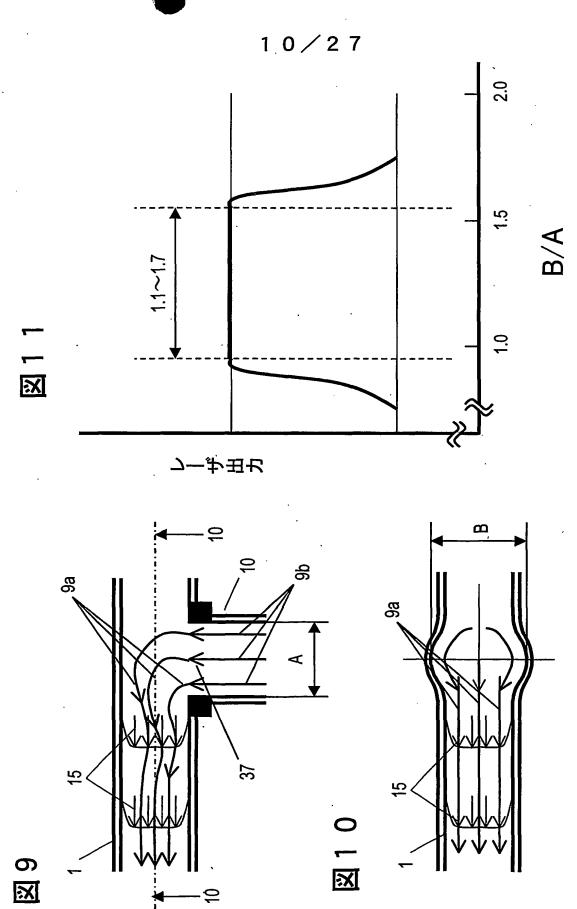
8/27



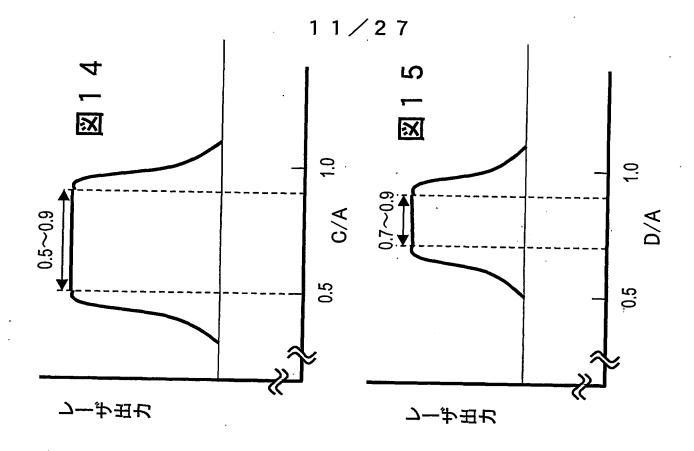
	·,	
		· .
,		

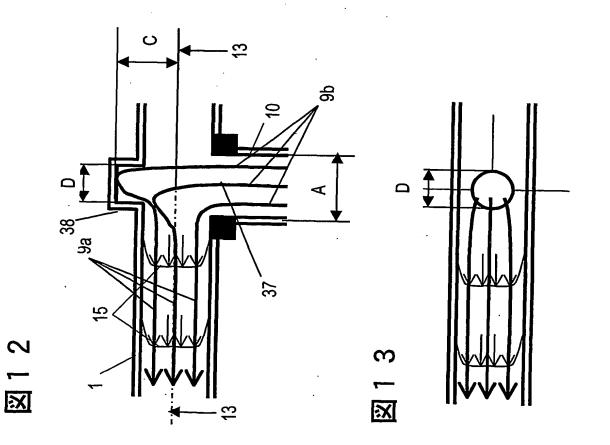




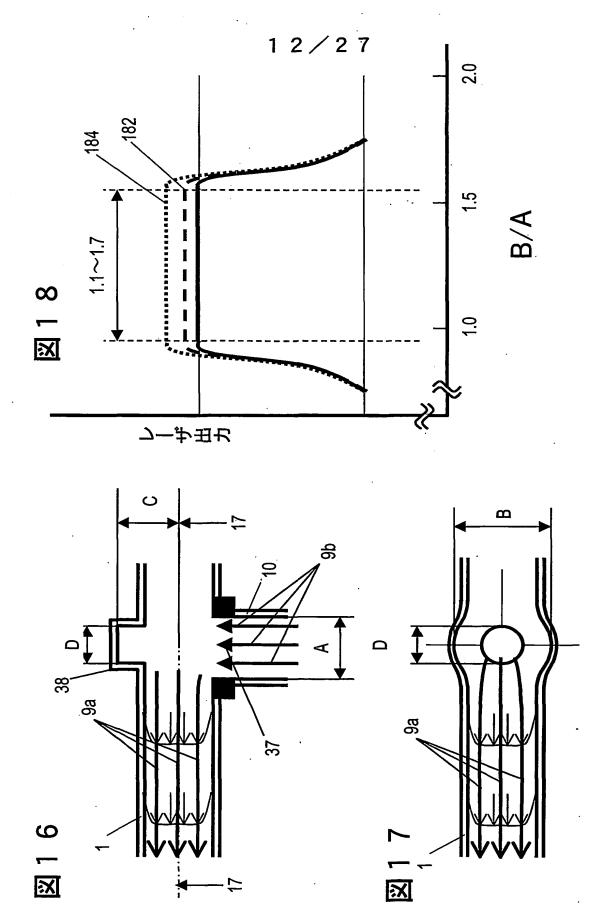


		· .		
	,			

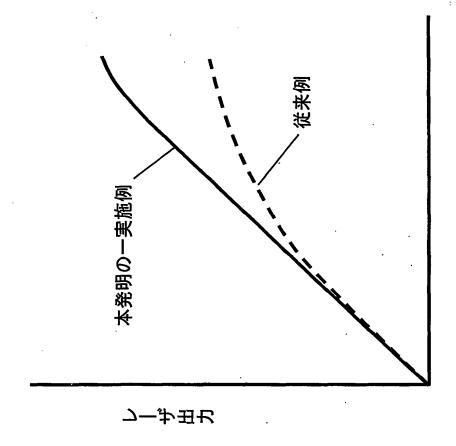




					, To 1 The sec 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
•		-	-		
		~			
					-
		•			
				•	
			•		
					4
					-

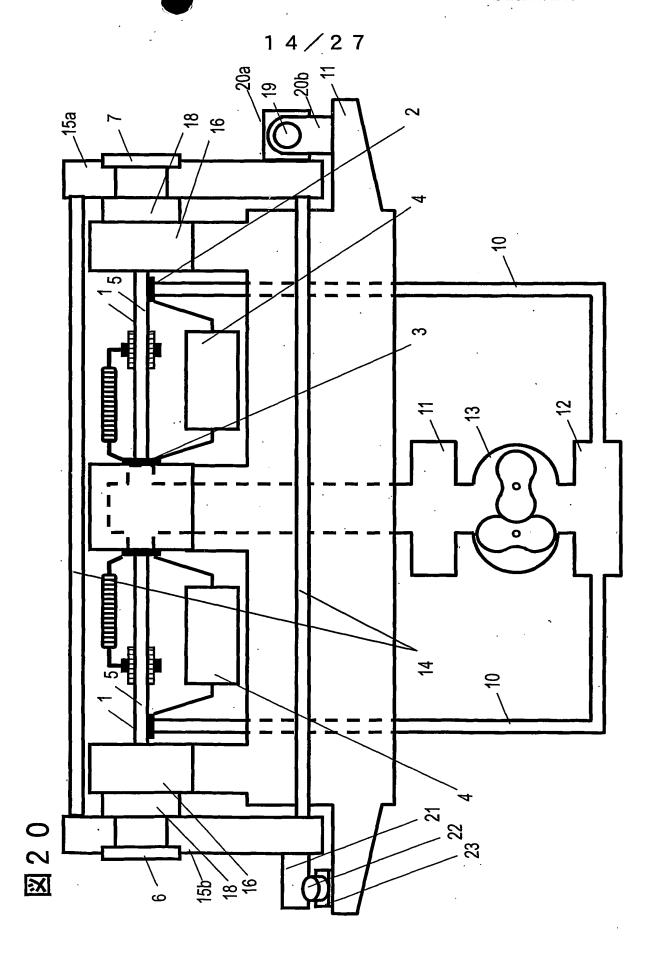


	•		
			•
	•		
			•
			•

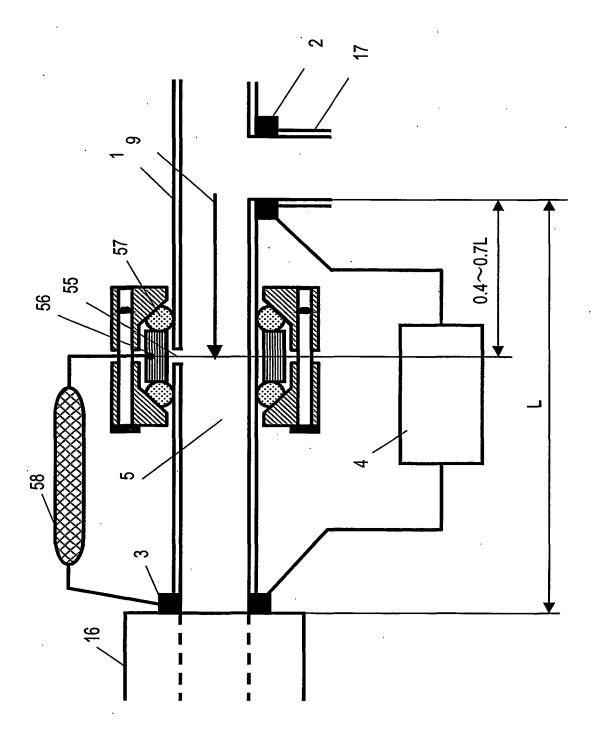


電気入力

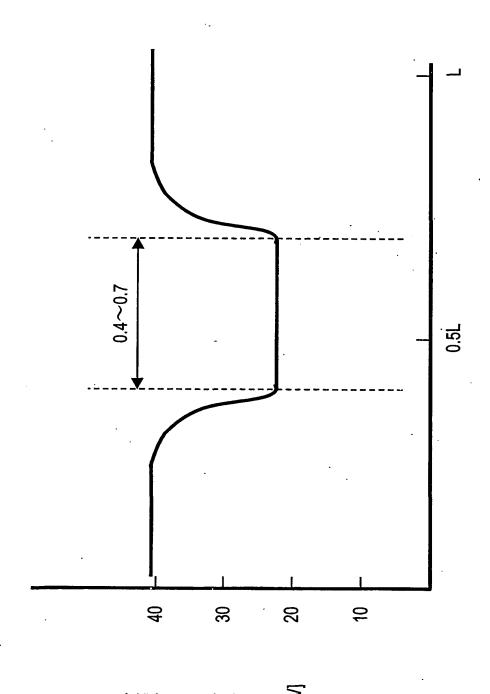
. **>** 1



			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			-
•			
•			
			•



			•
		•	
			•
			٠

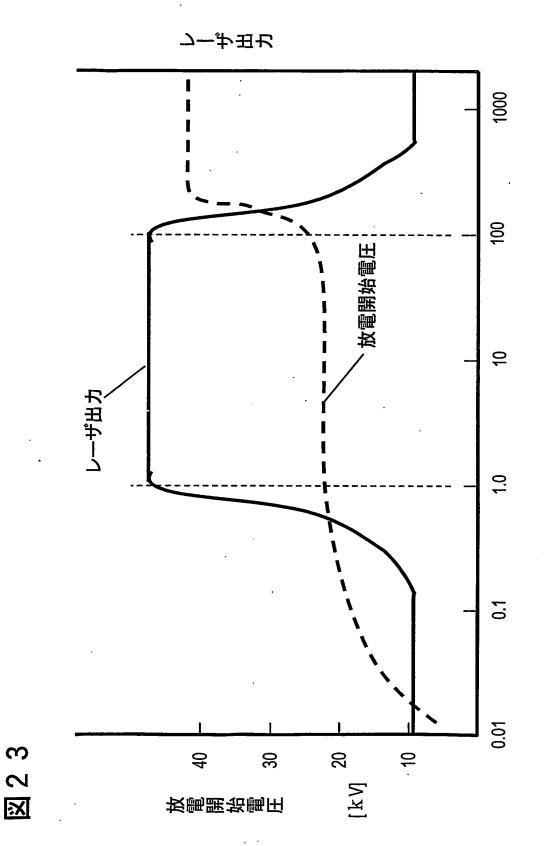


**巡**22

		•
		•
4		
		•
		,

က

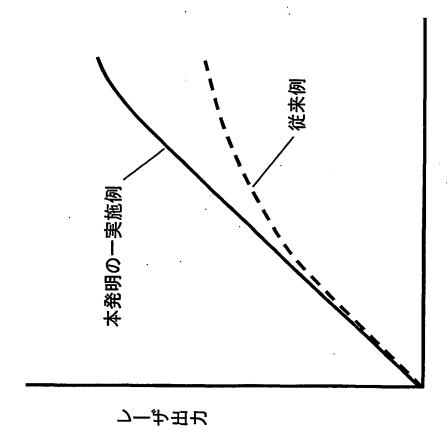
17/27



高抵抗の抵抗値[MΩ]

			•
			•,
			•



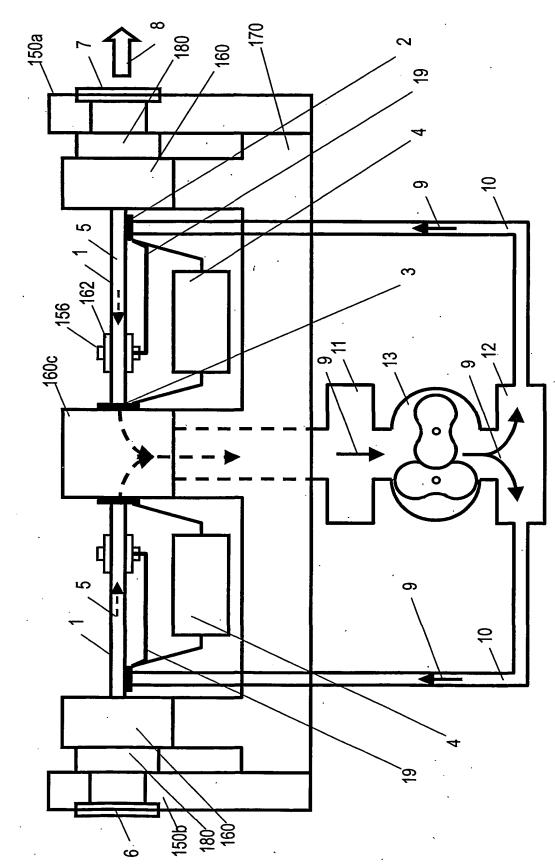


<u>巡</u>24

		•
		•
		٠

WO 01/93380 PCT/JP00/03447

19/27

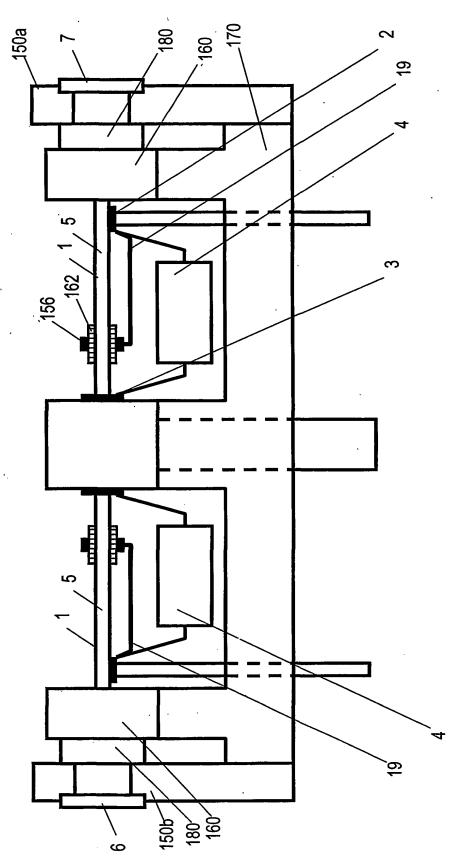


**巡**25

				_
		4		
			+	•
			•	•
•				
				•
				•
	•			

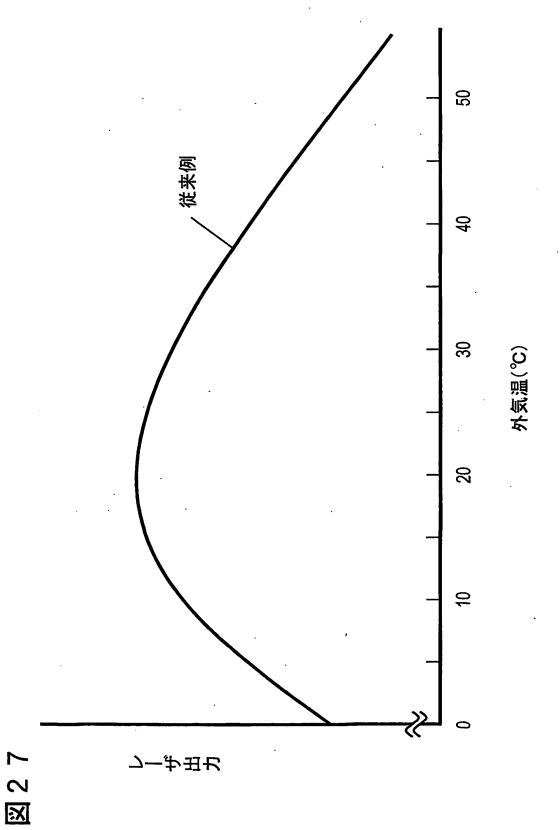
WO 01/93380 PCT/JP00/03447





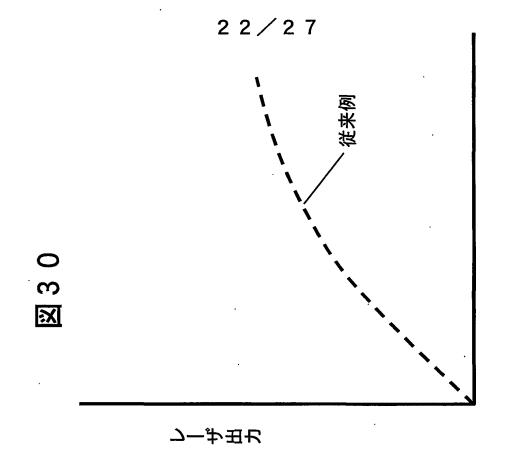
**巡**26

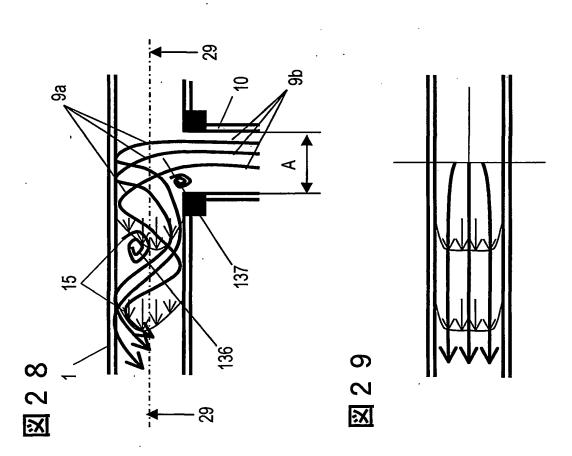
	Λ.	
	,	
		•
		•
		•
		•



		* !	
			,
			·
			•

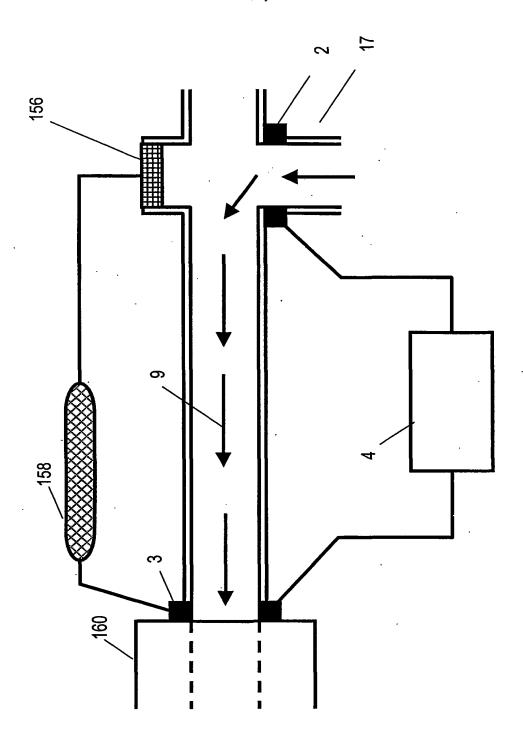






•			
			,
			-

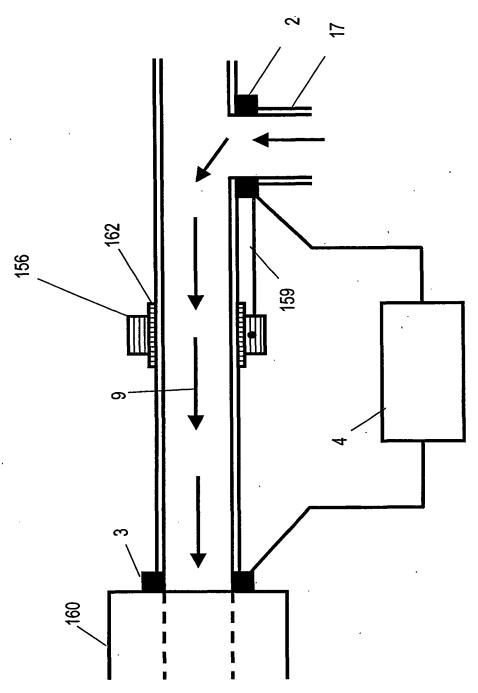
23/27



က

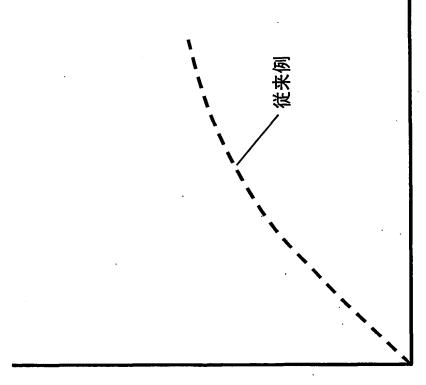
X





~

<u>巡</u> ധ •



レーザ出力

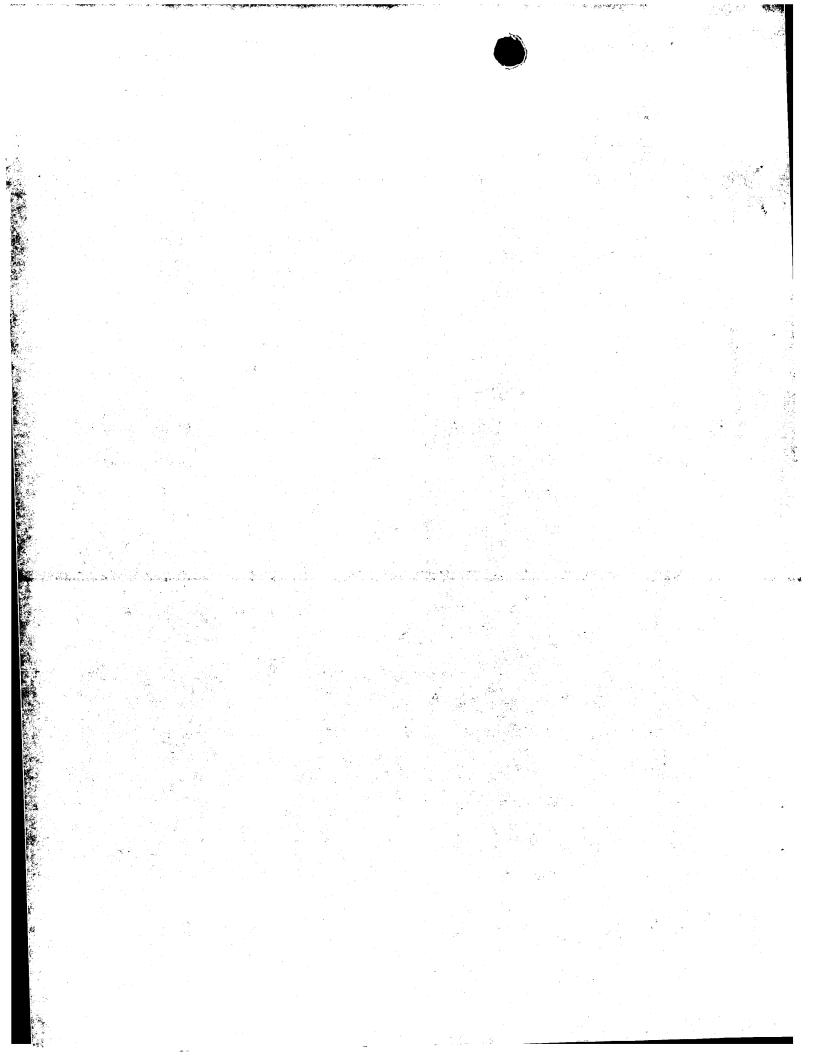
<u>図</u> の 電気入力

					-	
			•			
				,		
						<b>.</b>
						•
		•				
						•
						•



## 参照符号の説明

	シャスペーク つくかしつ	
	1	放電管
	2.3	電極
	4	電源部
5	5	放電空間
	<b>6</b> ′	終段鏡
	7	出力鏡
	8	レーザビーム
	9	ガス循環方向
10	1 0	レーザガス流路
	11,12	熱交換器
	1 3	送風機
	1 4	ミラーホルダ連結棒
	15a, 15	O a 出力ミラーホルダ
15	15b、15	0 b 終段ミラーホルダ
	16,160	放電管ホルダ
	17, 170	放電管ホルダベース
	18,180	接続管
	1 9	回転軸
20	20 a	支持部
	2 0 b	回転軸支持部
	2 1	支持棒
	2 2	回転体
	2 3	回転体支持部
25	200	回転支持部



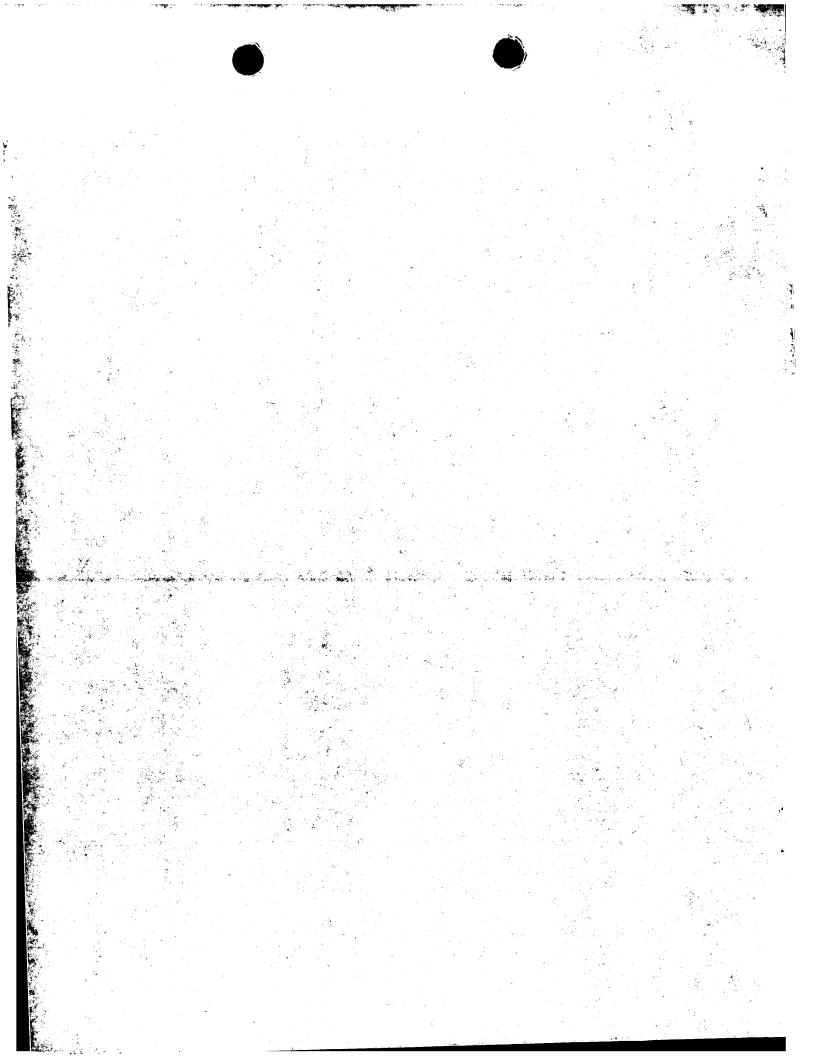
162

**15** 



27/27

			21/21
	2 2 0	スライダー	-
	2 4	ばね材	
	2 5	ばね押え	
	2 6	ピローボー	-ル
5	2 7	リブ	
	36,	1 3 6	渦流
	37,	1 3 7	レーザガス入り口
•	3 8	円柱状突起	己部
	5 5	穴	
10	56,	156	補助電極
	5 7	Οリング	
	58,	1 5 8	高抵抗
	5 9	レーザガス	<b>くの流れる方向</b>
	150	道体	



### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



#### (43) 国際公開日 2003 年4 月10 日 (10.04.2003)

# (10) 国際公開番号

(51) 国際特許分類7:

WO 03/030313 A1

H01S 3/041, 3/036

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/09930

(22) 国際出願日:

2002 年9 月26 日 (26.09.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2001-300650 特願2001-300655 2001年9月28日(28.09.2001) JР 2001年9月28日(28.09.2001)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電 器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-TRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府 門真市 大字門真 1006番地 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

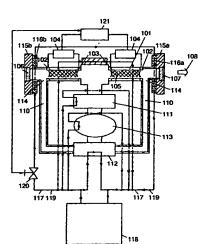
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 林川 洋之 (HAYASHIKAWA, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒561-0833 大阪 府 豊中市庄内幸町 1-5-2 4 Osaka (JP). 本宮 均 (HONGU, Hitoshi) [JP/JP]; 〒666-0129 兵庫県 川西市 禄台3-1-58 Hyogo (JP).

(74) 代理人: 岩橋文雄, 外(IWAHASHI,Fumio et al.); 〒 571-8501 大阪府 門真市 大字門真 1 0 0 6 番地 松下 電器産業株式会社内 Osaka (JP).

/続葉有7

(54) Title: GAS LASER TRANSMITTER

#### (54) 発明の名称: ガスレーザ発振装置



(57) Abstract: A gas laser transmitter, comprising a discharge tube for exciting laser medium, at least a pair of mirrors disposed on the optical axis of laser beam transmitted from the laser medium excited in the discharge tube, a laser gas flow passage connected to the discharge tube, a laser gas circulating means for circulating laser gas in the laser gas flow passage, and a heating control means for controlling the heating of at least either of the mirrors or laser gas circulating means.

(57) 要約:

レーザ発信装置は、レーザ媒質を励起する放電管と、放電管で励起さ れたレーザ媒質から放出されるレーザ光の光軸上に配置された少なく とも一対のミラーと、放電管に接続したレーザガス流路と、レーザガ ス流路中のレーザガスを循環させるレーザガス循環手段と、少なくと も前記ミラー或いは前記レーザガス循環手段の何れかの発熱を制御す る発熱制御手段を備える。

WO 03/030313

				ary on <del>ap</del>	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>						
									Sin was	9-	dire in
				•					4	<b>,</b>	াক কে
											k
			•					•			
		4									* 5
1											1
		4									
F .								•			
#							17				
						**	F 2				
								•			
				*							
		•									
	•	•	4"							•	
										. %	
*			(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1					A		v)	
		•							÷ .		
			4							34 A	
									<i>‡</i> ″		
	•										
		•					•				
								•			
<b>P</b>	•						-9				
•											
								*			
		•									
¥ 1.		#									
	.*	• •							•		
L.				•							
	The same of the sa	i ji	•			3.0					
Ľ,	•	4		7** (v	*	ر در بروس دو افتار د			•		
			v				<u> </u>	Maria de M Maria de Maria de Ma	e i cap.	r th	
	4	· ,				· 20			. , .	•	
je S			* *** *** ***			-3			•	ţŦ	
ies.											
							1. k. s.	•			
,	ny .		.K\$					* .			
e.				,				· 4 · ·			
				•			•		i i		
<b>為</b> (*)	to the second se										
Mar.	*										
F. (	en e			B		-	p*	•			
					٠,	. :	•	,			
$I^{(n)}$	£4			•			1				į.
	-										
r.				•						y T	
· į	•							,	:		
A								· ·	Ý		
f.	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
L	* * * *										
<b>b.</b>											
ha	•					,		•	* ***	(5)	
Water Commencer				₹.			1	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
	1	The state					4.4		5	Car.	